การสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่อุณหภูมิต่ำ

นางสาววาสนา ฆ้องวงศ์

สถาบนวทยบรการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ISBN 974-17-6140-6 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SYNTHESIS OF NANOSIZED BETA - SILICON CARBIDE AT LOW TEMPERATURE

Miss Wasana Khongwong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Ceramic Technology Department of Materials Science Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2004 ISBN 974-17-6140-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การสังเคราะห์บีตา–ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่
	อุณหภูมิต่ำ
โดย	นางสาววาสนา ฆ้องวงศ์
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา จินาวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณทิต

.....คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา จินาวัฒน์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร)

.....กรรมการ

(ศาสตราภิชาน ชิเกตากะ วาดะ)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจี๋ยมศิริเลิศ)

วาสนา ฆ้องวงศ์ : การสังเคราะห์บีตา - ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่อุณหภูมิต่ำ (SYNTHESIS OF NANOSIZED BETA - SILICON CARBIDE AT LOW TEMPERATURE) อ. ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สุพัตรา จินาวัฒน์, อ. ที่ปรึกษาร่วม : ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 84 หน้า ISBN 974-17-6140-6

้งานวิจัยนี้ได้ทดลองสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร โดย ใช้ซิลิกอน และคาร์บอนแบล็กที่มีพื้นที่ผิวและความเป็นผลึกต่างกัน บดผสมด้วยอัตราส่วน 1 : 1 โดย โมล ในเอทิลแอลกอฮอล์ อะซีโตน เฮกเซน และเบนซีน แล้วน้ำสารผสมที่ได้ไปอัดขึ้นรูปเป็นเม็ด ก่อน นำไปเผาในภาวะสุญญากาศ และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศา-เซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 และ 3 ชั่วโมง แล้วนำผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ไปขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่อง CIP ที่ความดันประมาณ 200 เมกะปาสคาล โดยมีอะลูมินา-อิทเทรีย เป็นสารตัวเติม ซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1850 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน จากการทดลองพบว่า ตัวกลางในการบดผสมทั้ง 4 ชนิด ไม่แสดงความ แตกต่างที่ชัดเจนต่อปฏิกิริยา การใช้ผงคาร์บอนแบล็กที่มีพื้นที่ผิวสูงกว่า และมีความเป็นผลึกน้อยกว่า ทำการเผาในสุญญากาศ ที่อุณหภูมิสูง ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และการใช้เวลาเผาที่ อุณหภูมิสูงสุดนาน เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์มากกว่า โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็น ลักษณะของ solid-solid reaction ร่วมกับ gas-solid reaction ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการ บดผสมระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอนแบล็ก ในเอทิลแอลกอฮอล์ เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส ใช้อัตราการให้ความร้อน 50 องศาเซลเซียสต่อนาที ในสุญญากาศ เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง มีความ บริสุทธิ์มากที่สุด อนุภาคมีข<mark>นา</mark>ด 10-100 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 19.75 ตารางเมตร ต่อกรัม ปริมาณซิลิกอนอิสระ และคาร์บอนอิสระเหลืออยู่ร้อยละ 0.106 และ 0.141 ตามลำดับ ชิ้นงาน ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ มีความหนาแน่นสูงสุดร้อยละ 89 ของค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความทนแรงดัดโค้ง 131 เมกะปาสคาล และความแข็งแบบ วิคเกอร์ส 745 เมกะปาสคาล

ภาควิชา	วัสดุศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2547	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4572491923 : MAJOR CERAMIC TECHNOLOGY

KEY WORD : BETA - SILICON CARBIDE/ NANOSIZED SILICON CARBIDE/ SILICON/ CARBON BLACK
 WASANA KHONGWONG : SYNTHESIS OF NANOSIZED BETA - SILICON CARBIDE
 AT LOW TEMPERATURE. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROF. SUPATRA
 JINAWATH, Ph.D., THESIS COADVISER : SIRIPORN LARPKIATTAWORN, Ph.D.,
 84 pp. ISBN 974-17-6140-6

In this research, nanosized beta-silicon carbide powder (β -SiC) was synthesized from the reaction between silicon (Si) and carbon black (C). The effect of surface area and crystallinity of carbon black on Si-C reaction was investigated. The Si to C mole ratio of 1:1 was mixed in each of these solvents : ethyl alcohol, acetone, hexane and benzene. The mixed powder was formed into pellets before firing in vacuum and Ar atmosphere at 1250, 1300 and 1350 °C by using heating rate of 20 and 50 °C/min for 1 and 3 hr. The results showed that all of solvents not exhibit significant different on reaction. However, using high surface area and non-crystalline form of carbon black, firing in vaccum at higher temperature and heating rate and keeping longer soaking time resulted in more complete reaction. The reaction between silicon and carbon black was the combination of gas-solid and solid-solid reaction. The highest purity of β -SiC powder was obtained by mixing silicon and carbon black in ethyl alcohol, firing at 1350 °C, heating rate of 50 °C/min for 1 hr in vacuum. The synthesized β -SiC powder has particle size of 10-100 nm, specific surface area of 19.75 m²/g, % free Si and % free C content of 0.106 and 0.141, respectively. This synthesized β -SiC powder was mixed with alumina-yttria as an additives, pressed into specimens by CIP at pressure of 200 MPa and sintered at 1850 °C in Ar atmosphere. The sintered samples had density of 89 % relative density, bending strength of 131 MPa and vickers hardness of 745 MPa.

Department Materials Science	Student's signature
Field of study Ceramic Technology	Advisor's signature
Academic year 2004	Co- advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของรองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา จินาวัฒน์ และ ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษา คำ แนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ด้วยดีตลอดมา ขอกราบ ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ให้ การสนับสนุนการทำงานในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือทดลอง และวิเคราะห์ทดสอบตลอดโครงการ จนงานวิจัยนี้สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต และ ดร. สุเมธ ภูมิอภิรดี ที่คอยถามไถ่ถึงความก้าวหน้า ของงานวิจัยอยู่เสมอ ขอขอบคุณ คุณปียาลัคน์ เงินชูกลิ่น ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอ มา ขอขอบคุณ คุณชุมพล บุษบก ที่ช่วยให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ผลการ ทดสอบ ขอขอบคุณ คุณชนินทร์ สุหร่ายนาค คุณสมศรี ทวีถาวร คุณเฉลิมชัย จีระพันธุ์ คุณนิตยา แก้วแพรก คุณพันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา คุณพรเพ็ญ ศิริดำรง คุณประสงค์ เจริญพรพิทักษ์ คุณแสงเดือน ดวงดาว คุณนพฤทธิ์ แซ่อิ้ง คุณสุปราณี เหล่าอุบล คุณวรรณงาม ธนวนิชนาม คุณโกสุม พิมพินิจ คุณอุบลวรรณ แผลงจันทึก และพนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุทุกคน ที่คอยถามไถ่ และเป็นกำลังใจที่ดี ตลอดมา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาโท ที่คอยเป็นกำลังใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยดีเสมอ

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติๆ ที่ให้ความสนับสนุน และเป็นกำลังใจใน การศึกษามาโดยตลอด

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	ହ
สารบัญ	ป
สารบัญตาราง	ល្ង
สารบัญรูป	ป

บทที่

1	บทนํ	ำ		1
	1.1	ความส์′	าคัญขอ <mark>งงานวิจัย</mark>	1
	1.2	วัตถุประ	ะสงค์ของง <mark>านวิ</mark> จัย	2
	1.3	ขอบเขต	กงานวิจัย	2
			1999999999999999	
2	ทฤษ	ฏีและงาน	เวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
	2.1	โครงสร้	างผลึกของซิลิกอนคาร์ไบด์	4
		2.1.1	ระบ <mark>บการเรียกชื่อของโครงสร้างผลึกซิลิกอนคา</mark> ร์ไบด์	6
		2.1.2	การเปลี่ยนรูปจากบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็นแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	6
	2.2	สมบัติท้	_{ไว้} ไปของซิลิกอนคาร์ไบด์	7
	2.3	กระบวเ	นการสังเคราะห์ผงซิลิกอนคาร์ไบด์	9
		2.3.1	Carbothermic reduction ของซิลิกา (SiO₂)	9
		2.3.2	Direct reduction ของโลหะซิลิกอนและคาร์บอน	12
		2.3.3	Thermal decomposition ของสารพอลิเมอร์ชนิดออแกโนซิลิกอน	
			(organosilicon polymer)	15
		2.3.4	Gas phase synthesis	17
	2.4	การนำซิ	ชิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้ประโยชน์	19

สารบัญ (ต่อ)

3	การเ	าดลองและ	ะวิเคราะห์ทดสอบ	
	3.1	การวิเคร	ราะห์วัตถุดิบและสารที่สังเคราะห์ได้	
		3.1.1	การวัดการกระจายขนาดอนุภาค	
		3.1.2	การศึกษาลักษณ <mark>ะโครงสร้างจุลภาค</mark>	
		3.1.3	การศึกษาโ <mark>ครงสร้างผลึก</mark>	
		3.1.4	การวัดพื้นที่ผิวโดย gas adsorption	
		3.1.5	การวัดความหนาแน่น	
		3.1.6	การตรวจวัดค่าร้อยละของน้ำหนักที่หายไป	
		3.1.7	การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ	
		3.1.8	การวิเคราะห์ปริมาณออกซีเจนโดยรวม (Total Oxygen)	
		3.1.9	การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอิสระ (Free C) ที่หลงเหลืออยู่	
		3.1.10	การวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ (Free Si) ที่หลงเหลืออยู่	
	3.2	การทดช	งอบชิ้นงานที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้	
		3.2.1	การตรวจวัดค่า <mark>ร้อยละของน้ำหนักที่หายไป</mark>	
		3.2.2	การวัดค่าร้อยละของการหดตัว	
		3.2.3	การวัดความหนาแน่นและความพรุนตัว	
		3.2.4	ความทนแรงดัดโค้ง (Bending Strength)	
		3.2.5	ความแข็ง (Hardness)	
	3.3	กระบวน	เการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	
	3.4	การเตรีย	ยมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์จากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้	
4	ผลก	ารทดลอง		

4.1	ผลการศึ	กษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ	39
	4.1.1	การกระจายขนาดอนุภาค	39
	4.1.2	ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัตถุดิบ	43

สารบัญ (ต่อ)

				หน้า
		4.1.3	ลักษณะโครงสร้างผลึกของวัตถุดิบ	44
		4.1.4	พื้นที่ผิวของวัตถุดิบ	47
		4.1.5	ความหนาแน่นของวัตถุดิบ	48
		4.1.6	องค์ประกอบทางเ <mark>ค</mark> มีของวัตถุดิ <mark>บ</mark>	48
		4.1.7	ปริมาณออกซิเจนโดยรวม (Total Oxygen)	49
4	1.2	ผลของ	ตัวแปรต่อ <mark>การสังเคราะ</mark> ห์ผง <mark>บี</mark> ตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	50
		4.2.1	ผลของ <mark>ชนิดสารละลายที่ใช้เป็นตัวกลางในการบ</mark> ดผสม	50
		4.2.2	ผลขอ <mark>งชนิดคาร์บอนต่อการสังเคราะห์ผง</mark> บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	53
		4.2.3	ผลของบรรยากาศการเผาต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	55
		4.2.4	ผลขอ <mark>งอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอน</mark> คาร์ไบด์	58
		4.2.5	ผลของอ <mark>ัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์</mark> ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	62
		4.2.6	ผลของเว <mark>ลาต่อ</mark> การสัง <mark>เคราะห์ผง</mark> บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	67
4	1.3	ผลการ	เปรียบเทียบผ <mark>งบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเค</mark> ราะห์ได้กับท้องตลาด	69
4	1.4	ผลวิเค	ราะห์และทดสอบ <mark>สมบัติของชิ้นงานที่เตรี</mark> ยมจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่	
		สังเครา	ะห์ได้	71
5 ø	งรุปผะ	จการทด	าลองและข้อเสนอแนะ	74
รายการอ้	ข้างอิง		สถานแล้นขนรีการ	76
ภาคผนว	ก			79
ภาคผ	นวก เ	n	าลงกรณ์แหก่วิทยาลย	80
ภาคผ	นวก :	1		83
ประวัติผู้เ	เขียนวิ	วิทยานิเ	พนธ์	84

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	สมบัติทั่วไปของซิลิกอนคาร์ไบด์	8
ตารางที่ 2.2	ปฏิกิริยาทั้งหมดในการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis.	18
ตารางที่ 3.1	รายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง	21
ตารางที่ 3.2	ภาวะต่างๆ ที่ใช้สังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	36
ตารางที่ 3.3	สัดส่วนของส่วนผสม <mark>ในการเตรียมชิ้นงาน</mark> ซิลิกอนคาร์ไบด์	37
ตารางที่ 4.1	การกระจายขนาด <mark>อนุภาคขอ</mark> งวัตถุดิบ	39
ตารางที่ 4.2	ค่าพื้นที่ผิวของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก	47
ตารางที่ 4.3	ความหนาแน่นของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก	48
ตารางที่ 4.4	ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก	49
ตารางที่ 4.5	ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ และความหนาแน่นของผงบีตา-	
	ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เตรียมจากคาร์บอนแบล็กต่างชนิดกัน	54
ตารางที่ 4.6	ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ และน้ำหนักที่หายไปของผง	
	บีตา-ซิลิกอนค <mark>า</mark> ร์ไบด์ ที่เผาในสุญญากาศ และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน	56
ตารางที่ 4.7	ผลวิเคราะห์ปริมา <mark>ณซิลิกอนอิสระ คาร์บอ</mark> นอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนักที่	
	หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิต่างๆ	59
ตารางที่ 4.8	ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนักที่	
	หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	
	ต่างๆ กัน	63
ตารางที่ 4.9	ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนักที่	
	หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศา	
	เซลเซียส ในสุญญากาศ และอัตราการเพิ่มความร้อน 20 องศาเซลเซียสต่อนาที	
	เป็นเวลานาน 1 และ 3 ชั่วโมง	67
ตารางที่ 4.10 ⁹	สมบัติของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้กับท้องตลาด	69
ตารางที่ 4.11	สมบัติทางกายภาพของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เติมอะลูมินา-อิทเทรีย หลัง	
	ซินเทอร์ที่ 1850 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน	71
ตารางที่ 4.12	สมบัติทางกลของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เติมอะลูมินา-อิทเทรีย หลังซินเทอร์ที่	
	1850 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน	72

สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 2.1	การเชื่อมกันแบบเตตระฮีดรอลของอะตอมคาร์บอน (C) กับอะตอมซิลิกอน (Si) ทั้ง	
	4 ที่อยู่ล้อมรอบ	5
รูปที่ 2.2	โครงสร้างผลึกของซิลิกอนคาร์ไบด์	5
รูปที่ 2.3	การจัดเรียงอะตอมของซิลิกอ <mark>นคาร์ไบด์ในรูป</mark> แบบต่างๆ	6
รูปที่ 2.4	ผลของความดันบรรย <mark>ากาศต่อ</mark> การเกิดแ <mark>อลฟา-ซิ</mark> ลิกอนคาร์ไบด์ และบีตา-ซิลิกอน	
	คาร์ใบด์	7
รูปที่ 2.5	ผลของเวลาในการบดผสมที่มีต่อการกระจายขนาดของผง Si ₅₀ C ₅₀ Alloy	14
รูปที่ 2.6	กลไกของปฏิกิริยาของพอลิคาร์โบไซเลนในระหว่างการผ่านความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ	
	ต่างๆ	16
รูปที่ 2.7	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำมาจากซิลิกอนคาร์ไบด์	20
รูปที่ 3.1	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยายสูง (Field emission scanning	
	electron microscope <mark>,</mark> FE-SEM) รุ่น JSM-6340F	23
รูปที่ 3.2	ชุดประกอบสำหรับวิเ <mark>ค</mark> ราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	29
รูปที่ 3.3	เครื่อง universal testing m <mark>achine รุ่น 4469 ยี่ห้อ</mark> Instron	32
รูปที่ 3.4	รอยกดจากหัวกดวิคเกอร์ส	34
รูปที่ 3.5	กระบวนการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยการบดผสมผงโลหะซิลิกอนกับผง	
	คาร์บอนแบล็ก แล้วเผาที่ภาวะต่างๆ	35
รูปที่ 3.6	เตาควบคุมบรรยากาศ รุ่น High-Multi 500FV PHP-R-5 FRET-25	35
รูปที่ 3.7	กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	36
รูปที่ 3.8	ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์	38
รูปที่ 3.9	กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการซินเทอร์ชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์	38
รูปที่ 4.1	การกระจายอนุภาคของผงซิลิกอน	40
รูปที่ 4.2	การกระจายอนุภาคแบบสะสมของผงซิลิกอน	40
รูปที่ 4.3	การกระจายอนุภาคของผงอะลูมินา	41
รูปที่ 4.4	การกระจายอนุภาคแบบสะสมของผงอะลูมินา	41
รูปที่ 4.5	การกระจายอนุภาคของผงอิทเทรีย	42

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 4.6	การกระจายอนุภาคแบบสะสมของผงอิทเทรีย
รูปที่ 4.7	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของซิลิกอน ที่กำลังขยาย 750
	เท่า
รูปที่ 4.8	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผงคาร์บอนแบล็ก ที่กำลัง
	ขยาย 500 เท่า
รูปที่ 4.9	กราฟ XRD ของผงซิลิกอน
รูปที่ 4.10	กราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-1
รูปที่ 4.11	กราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-2
รูปที่ 4.12	กราฟ XRD ของผงอะลูมินา
รูปที่ 4.13	กราฟ XRD ขอ <mark>งผงอิทเทรีย</mark>
รูปที่ 4.14	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที
	อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน
	1 ชั่วโมง ในสุญญากา <mark>ศ</mark>
รูปที่ 4.15	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที
	อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน
	1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน
รูปที่ 4.16	ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บ <i>ด</i>
	ผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน
	1 ชั่วโมง ในสุญญากาศ
รูปที่ 4.17	ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บด
	ผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน
	1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน
รูปที่ 4.18	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงคาร์บอนแบล็ก-1 และผง
	คาร์บอนแบล็ก-2 เผาในสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่ม
	อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 4.19	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	
	50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิและบรรยากาศต่างๆ กัน	57
รูปที่ 4.20	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	
	50 องศาเซลเซียสต่อนาที นา <mark>น 1 ชั่วโมง ใน</mark> สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ	
	1350 องศาเซลเซียส	60
รูปที่ 4.21	กราฟแสดงปริมาณ <mark>ของซิลิกอน</mark> อิสระในผ <mark>งบีตา-ซิลิกอ</mark> นคาร์ไบด์ที่เผาในสุญญากาศ	
	และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที	
	นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่างๆ	61
รูปที่ 4.22	ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่	
	สังเคราะห์จากก <mark>ารเผาในสุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุ</mark> ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส	
	ต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่างกัน	62
รูปที่ 4.23	กราฟ XRD ของ <mark>ผ</mark> งบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากการเผาในสุญญากาศ นาน 1	
	ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ แล <mark>ะอ</mark> ัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่างๆ กัน	64
รูปที่ 4.24	กราฟแสดงปริมาณของซิลิก <mark>อนอิสระในผงบีตา-</mark> ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ	
	ต่างๆ ในภาวะสุญญากาศ นาน 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50	
	องศาเซลเซียสต่อนาที	65
รูปที่ 4.25	ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	
	สังเคราะห์ที่ 1300 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ นาน 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่ม	
	อุณหภูมิต่างกัน	66
รูปที่ 4.26	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ 1250 องศาเซลเซียส ใน	
	สุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ระยะเวลาในการ	
	รักษาอุณหภูมิต่างกัน	68
รูปที่ 4.27	กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ 1300 องศาเซลเซียส ใน	
	สุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ระยะเวลาในการ	
	รักษาอุณหภูมิต่างกัน	68
รูปที่ 4.28	ภาพถ่ายจาก FE-SEM ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า	70

สารบัญรูป (ต่อ)



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของงานวิจัย

สารซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นสารประกอบที่มีพันธะโควาเลนต์ที่แข็งแรงมาก มี โครงสร้างผลึกหลายรูปแบบ สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีโครงสร้างผลึกเป็น คิวบิก เรียกว่า บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ (β-SiC) และประเภทที่มีโครงสร้างผลึกเป็นเฮกซะโกนอล และรอมโบฮีดรอล เรียกว่า แอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ (α-SiC) ซิลิกอนคาร์ไบด์สามารถเปลี่ยน ระบบผลึกจากบีตาไปเป็นแอลฟาเมื่อให้ความร้อนสูงกว่า 2000 องศาเซลเซียส สีของซิลิกอน คาร์ไบด์ขึ้นกับความบริสุทธิ์ โดยถ้ามีความบริสุทธิ์สูงมาก จะไม่มีสี แต่ถ้ามีสิ่งเจือปนจะมีสี ต่างๆ กัน เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ ฟ้า เทา ดำ เป็นต้น สารซิลิกอนคาร์ไบด์มีสมบัติเด่นด้านความ แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และมีความคงทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง จึงมีการ นำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้เป็นวัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู ใช้ในส่วนประกอบต่างๆ ของ เครื่องยนต์ หรือเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ เป็นวัสดุ โครงสร้างแทนโลหะ และอัลลอยด์ต่างๆ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ และ น้ำหนักเบา

การสังเคราะห์สารซิลิกอนคาร์ไบด์มีหลายวิธี ที่นิยมมากที่สุดคือ วิธีการเผารีดักขัน ระหว่างทรายแก้วกับถ่านโค๊ก เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน วัตถุดิบหาง่าย ราคาถูก แต่ข้อเสียของ วิธีนี้คือ ใช้พลังงานในการผลิตสูง อุณหภูมิที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาสูงประมาณ 1900 ถึง 2700 องศาเซลเซียส สำหรับแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ แต่ถ้าเป็นบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ จะอยู่ในช่วง 1500 ถึง 1600 องศาเซลเซียส และอนุภาคของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมโครเมตร นอกจากนี้ยังควบคุมความบริสุทธิ์และขนาดอนุภาคของผลิกซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ยาก สำหรับการ สังเคราะห์โดยวิธี polymer conversion และ gas phase synthesis จะให้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง และอนุภาคขนาดเล็กกว่า แต่มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เฉพาะ และสารตั้งต้นมีราคาสูง นอกจากนี้การทำให้เกิดปฏิกิริยากันโดยตรงระหว่างโลหะซิลิกอนและ คาร์บอน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถผลิตผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ละเอียดได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ราคาของสารตั้งต้นไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ต้องควบคุมบัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาให้ เหมาะสมด้วย จากการศึกษาพบว่า การใช้สารตั้งต้นที่มีขนาดละเอียด และทำการบดผสมให้ เข้ากัน มีส่วนช่วยทำให้เกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ที่อุณหภูมิต่ำลง และยังพบว่าขนาดอนุภาคที่ แตกต่างกันของคาร์บอน บรรยากาศ และภาวะการเผา ต่างมีผลต่อปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ ซิลิกอนคาร์ไบด์ ดังนั้น วิธีการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาโดยตรงระหว่าง โลหะซิลิกอนและคาร์บอน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ งานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา และ ควบคุมตัวแปรในการสังเคราะห์สารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีขนาดละเอียดที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้ โลหะซิลิกอน และคาร์บอนเป็นสารตั้งต้น โดยตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ ขนาดอนุภาคของ วัตถุดิบ และภาวะการเผา ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ เวลา อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ บรรยากาศในการเผา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร และสามารถทำการ ขึ้นรูปชิ้นงานจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมได้ และทดสอบสมบัติของชิ้นงาน เพื่อประเมิน ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 ศึกษาผลของขนาดอนุภาคคาร์บอนแบล็กต่อการสังเคราะห์บีตา–ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มี อนุภาคระดับนาโนเมตรที่อุณหภูมิต่ำ

1.2.2 ศึกษาสมบัติของบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จากสารผสมระหว่างซิลิกอนและ คาร์บอนแบล็กที่แต่ละภาวะการเผา

1.2.3 ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่เตรียมได้

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1.3.1 วิเคราะห์สมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ ดังนี้

- การกระจายขนาดอนุภาค ด้วยเครื่อง centrifugal particle size analyzer
- โครงสร้างจุลภาค ด้วยเครื่อง SEM (scanning electron microscope)
- โครงสร้างผลึก ด้วยเครื่อง X-ray diffractometer
 - พื้นที่ผิว ด้วยเครื่อง surface area analyzer โดยวิธี BET
 - ความหนาแน่น ด้วยเครื่อง AccuPyc 1330 Pycnometer
 - องค์ประกอบทางเคมี ด้วยเครื่อง EDS (energy dispersive spectrometer)

1.3.2 สังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ดังนี้

- ผลของชนิดสารละลายที่ใช้เป็นตัวกลางในการบดผสม

- ผลของชนิดคาร์บอนแบล็ก
- ผลของบรรยากาศ
- ผลของอุณหภูมิ
- ผลของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
- ผลของเวลาในการรักษาอุณหภูมิ

1.3.3 วิเคราะห์สมบัติของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์จากภาวะต่างๆ แล้วเลือกสูตรที่ มีสมบัติตามต้องการเปรียบเทียบกับผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากท้องตลาด แล้วใช้เป็นสาร ตั้งต้นในการเตรียมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์

1.3.4 ขึ้นรูปชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์จากผงบี่ตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ และตรวจวัด สมบัติต่างๆ ดังนี้

- สมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น การหดตัว น้ำหนักที่หายไป เป็นต้น
- สมบัติทางกล เช่น ความทนแรงดัดโค้ง ความแข็ง เป็นต้น
- วิเคราะห์โ<mark>ครงสร้างจุลภาค</mark>

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นวัสดุเซรามิกที่มีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้เป็นวัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ หรือเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง (อยู่ในช่วง 9-10 Mohs scale) ทนต่อการ กัดกร่อนของสารเคมีที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีการนำความร้อนที่ดี ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว ต่ำ น้ำหนักเบา^[1-4] และวัตถุดิบที่ใช้เตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์ มีราคาถูกกว่าซิลิกอนไนไตรด์ ทำให้มี การพัฒนาซิลิกอนคาร์ไบด์เพื่อใช้เป็นวัสดุโครงสร้างแทนโลหะ และอัลลอยด์ต่างๆ ด้วย

ซิลิกอนคาร์ไบด์อาจพบได้ในธรรมชาติ แต่ไม่บ่อยนัก และมีปริมาณน้อย โดยพบอยู่ในแร่ moissanite ใน meteroite ตามบริเวณภูเขาไฟ และอาจพบปะปนอยู่ในแร่ carnallite (KCI.MgCl₂.6H₂O) ดังนั้น ในอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ขึ้นเอง วิธีการ สังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ เริ่มแรกเกิดขึ้นในปี 1890⁽¹⁾ โดยเรียกว่า "Acheson process" เนื่องจาก Edward G. Acheson ซึ่งเป็นผู้ช่วยของ T. Adison ค้นพบโดยบังเอิญ ขณะที่เขา ทดลองสังเคราะห์เพชร แต่ Acheson คิดว่าสารที่เกิดขึ้นเป็นสารประกอบระหว่างคาร์บอน (carbon) และอะลันดัม (alundum) ที่มีอยู่ในดิน เขาจึงตั้งชื่อสารใหม่นี้ว่า คาร์บอรันดัม (carbolundum) จากนั้นได้มีนักวิจัยทำการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการในการ สังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ได้หลาย วิธี ซึ่งในแต่ละวิธีจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป

2.1 โครงสร้างผลึกของซิลิกอนคาร์ไบด์

โครงสร้างผลึกของซิลิกอนคาร์ไบด์มีประมาณ 200 แบบ แต่ที่พบบ่อยๆ มีเพียง 2-3 แบบ เท่านั้น^[1] แต่ละแบบประกอบด้วยชั้นของเตตระฮีดรอลที่มีอะตอมของคาร์บอนและอะตอมของ ซิลิกอนมาเชื่อมต่อกัน ดังรูปที่ 2.1^[5] เมื่อเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ แล้วเกิดการหมุน ลำดับทิศทางใน แต่ละชั้นจะต่างกัน ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.2^[6] ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทที่มีโครงสร้างผลึกเป็นระบบคิวบิก (cubic) เรียกว่า บีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ (β-SiC) และประเภทที่มีโครงสร้างผลึกเป็นระบบนอนคิวบิก เรียกว่า แอลฟา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ (α-SiC) ซึ่งได้แก่ ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (hexagonal) และรอมโบฮีดรอล (rhombohedral)



รูปที่ 2.1 การเชื่อมกันแบบเตตร<mark>ะฮีดรอลของอะตอมคาร์บอน (C)</mark> กับอะตอมซิลิกอน (Si) ทั้ง 4 ที่ อยู่ล้อมรอบ (ระยะ a และ C-Si มีค่าประมาณ 3.08 และ 1.89 อังสตรอม)



2.1.1 ระบบการเรียกชื่อของโครงสร้างผลึกซิลิกอนคาร์ไบด์ [1,5,7]

ระบบในการเรียกชื่อเพื่ออธิบายความแตกต่างของโครงสร้างผลึกซิลิกอนคาร์ไบด์ ได้ กำหนดให้มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า และตามด้วยตัวอักษร โดยตัวเลข แสดงถึงจำนวนชั้นของอะตอมที่ จัดเรียงเป็นระบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อยๆ ส่วนตัวอักษรด้านหลัง แสดงถึงโครงสร้างผลึกว่าเป็นโครง สร้างผลึกแบบใด โดยให้ "C" แทน คิวบิก "H" แทน เฮกซะโกนอล และ "R" แทน รอมโบ-อีดรอล ตัวอย่างการจัดเรียงอะตอมของซิลิกอนคาร์ไบด์ในรูปแบบ 3C 2H 4H และ 6H แสดงดังรูป ที่ 2.3^[5]



รูปที่ 2.3 การจัดเรียงอะตอมของซิลิกอนคาร์ไบด์ในรูปแบบต่างๆ

2.1.2 การเปลี่ยนรูปจากบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็นแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

โดยปกติแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ได้มาจากการทำปฏิกิริยาของสารตั้งต้นในสถานะของ ไอ-ของเหลว-ของแข็ง ที่อุณหภูมิสูงในช่วง 2300-2700 องศาเซลเซียส ส่วนบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ได้จากกระบวนการผลิตที่มีพอลิเมอร์เป็นสารตั้งต้น ซึ่งเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 2000 องศา-เซลเซียส^[7] และมีความเสถียรภาพต่ำกว่า เมื่อเทียบกับแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ดังนั้นบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์สามารถเปลี่ยนรูปเป็นแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เมื่อให้ความร้อนมากกว่า 2000 ใน กรณีที่ไม่มีการเติมตัวเติมเข้าไป โดยเปลี่ยนไปอยู่ในรูป 6H และ 15R แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติม เข้าไป อุณหภูมิในการเปลี่ยนรูปจะลดลง โดยการเติมตัวเติมต่างชนิดกัน ทำให้ได้รูปแบบผลึก ต่างกันด้วย เช่น ถ้าเติมโบรอน จะได้เป็น 4H ในขณะที่เติมไนโตรเจน จะได้เป็น 6H^[1] แต่ในบาง กรณีสามารถผลิตบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ที่อุณหภูมิสูง เช่น ภายใต้ความดันบรรยากาศที่ เหมาะสม รูปที่ 2.3 แสดงผลของความดันบรรยากาศต่อการเกิดแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ และ บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ^[7]



รูปที่ 2.4 ผลของความดันบรรยากาศต่อการเกิดแอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์และบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ (Ryan และคณะ, 1968)

2.2 สมบัติทั่วไปของซิลิกอนคาร์ไบด์

ชิลิกอนคาร์ไบด์เป็นสารประกอบที่มีพันธะระหว่างอะตอมเป็นพันธะโควาเลนต์ที่แข็งแรง มาก ทำให้มีค่ายังมอดูรัส (Young's modulus) สูง การสลายตัวให้เกิดแก๊สของซิลิกอนและ คาร์บอนจึงต้องใช้อุณหภูมิสูงมากกว่า 2200 องศาเซลเซียส ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์ มากๆ จะไม่มีสี แต่ถ้ามีธาตุไนโตรเจน อะลูมิเนียม เจือปนอยู่จะมีสีเขียว และสีฟ้า ตามลำดับ และ หากมีธาตุหลายชนิดปนอยู่จะมีสีดำ ซิลิกอนคาร์ไบด์ชนิดแอลฟามีความเสถียรภาพมากกว่าชนิด บีตา ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ที่ต่ำของทั้งคาร์บอนและซิลิกอน ทำให้ยากต่อการชินเทอร์ผงซิลิกอน คาร์ไบด์ให้ได้ความหนาแน่นสูงๆ ดังนั้น ในการซินเทอร์ซิลิกอนคาร์ไบด์ จึงจำเป็นต้องใส่สาร ตัวเติม เช่น โบรอน คาร์บอน อะลูมินา อิทเทรีย เป็นต้น เพื่อช่วยให้การซินเทอร์เกิดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ซิลิกอนคาร์ไบด์ยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโลหะ นำความร้อนสูง และยังทนทานต่อ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี สมบัติทั่วไปของซิลิกอนคาร์ไบด์แสดงดัง ตารางที่ 2.1⁽⁸⁾

สมบัติ	แอลฟา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์	
	(α-SiC)	(β-SiC)	
สมบัติทางระบบผลึก			
น้ำหนักโมเลกุล (M. W.)	40.10	40.10	
ความหนาแน่นทางทฤษฎี (TD, g/cm³)	3.21	3.21	
โครงสร้างผลึก (crystal structure)	เฮกซะโกนอล	คิวบิก	
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิก			
และความร้อน			
ความจุความร้อนที่ความดันคงที่	298- <mark>6</mark> 62 (เคลวิน) ^ª	298-678 (เคลวิน) ^ะ	
(C _p , J/mol.K) ¹	662-3200 (เคลวิน) ^ь	678-3200 (เคลวิน) ^d	
เอนทาลปี (Δ _f H° ₂₉₈ , kJ/mol)	-71.6	-73.2	
พลังงานอิสระของกิบส์ ($\Delta_{ m f}{ m G}^{\circ}_{_{298}},$	-69.1	-70.9	
kJ/mol)			
เอนโทรปี (S° ₂₉₈ , J/mol.K)	16.5	16.6	
จุดหลอมเหลว (T _{mp} , K)	3103		
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความ <mark>ร้อ</mark> น	5.12 (298-1273 เคลวิน)	3.8 (473 เคลวิน)	
(α, 10 ⁻⁶ /K)	5.48 (298-1773 เคลวิน)	4.3 (673 เคลวิน)	
	5.77 (298-2273 เคลวิน)	4.8 (873 เคลวิน)	
	5.94 (298-1773 เคลวิน)	5.2 (1073 เคลวิน)	
	19989191-11830-	5.8 (1273 เคลวิน)	
การนำความร้อน (κ , W/m.K)	41.0 (293 เคลวิน)	42.0 (300 เคลวิน)	
	33.5 (873 เคลวิน)	19.0 (1000 เคลวิน)	
	25.5 (1073 เคลวิน)	13.0 (1500 เคลวิน)	
~	21.3 (1273 เคลวิน)	-	
สมบัติทางกล	A A		
(ที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน)	านวทยาเรก	าร	
ยังมอดูรัส (E, GPa)	408	432	
ความทนแรงดัดโค้ง (σ _{bend} , MPa)	350 <u>+</u> 40	560	
สมบัติทางไฟฟ้า			
(ที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน)			
ความต้านทานไฟฟ้า ($ ho$ x10 8 , Ω .m)	4x10 ⁵	(0.17-1)×10 ⁶	

¹ $C_p = A+1.0E-3*B*T(K)+1.0E5*CT^2+1.0E^{-6}D*T^2$

^a A = 36.489	B = 14.652	C = -13.037	D = 0
^b A = 49.597	B = 2.636	C = -35.606	D = 0
^c A = 35.648	B = 15.954	C = -12.523	D = 0
^d A = 50.576	B = 1.992	C = -37.639	D = 0

2.3 กระบวนการสังเคราะห์ผงซิลิกอนคาร์ไบด์

กระบวนการในการสังเคราะห์ผงซิลิกอนคาร์ไบด์มีอยู่หลายวิธี สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 วิธี คือ

- 1. Carbothermic reduction ของซิลิกา (SiO₂)
- 2. Direct reaction ของโลหะซิลิกอนและคาร์บอน
- 3. Thermal decomposition ของสารพอลิเมอร์ชนิดออแกโนซิลิกอน (organosilicon polymer)
- 4. Gas phase synthesis

ในแต่ละวิธีมีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป ในการเลือกวิธีที่เหมาะสม ควรคำนึงถึงรูป แบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ความบริสุทธิ์ ขนาด และรูปร่าง เป็นต้น

2.3.1 Carbothermic reduction ของซิลิกา (SiO₂)

เป็นวิธีการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่นิยมใช้ในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนต่ำ วิธีนี้มีพื้นฐานมาจากวิธี Acheson process ที่มีมากว่า 100 ปีแล้ว กระบวนการ carbothermic reduction ระหว่างซิลิกา และคาร์บอน เป็นการอาศัยคาร์บอนเป็นตัวรีดิวซ์ซิลิกา ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากวิธีนี้มีขนาดใหญ่ เพราะเกิดการโตของเกรน เนื่องจากอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาสูงถึง 2000 ถึง 2300 องศาเซลเซียส^(9,19) และใช้เวลานาน ดังนั้นจึงมีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อที่จะลดอุณหภูมิในการสังเคราะห์

Ruiming Ren และคณะ⁽⁹⁾ ทำการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยใช้เทคนิค integrated mechanical thermal activity process (IMTA) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์โดย carbothermic reduction วิธีหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา โดยใช้หลักการกระตุ้นด้วยพลังงานกล เพื่อให้ เกิดปฏิกิริยาระหว่างซิลิกา และคาร์บอน ที่อุณหภูมิห้องด้วย high-energy milling และตามด้วย การเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ที่สมบูรณ์ กระบวนการผลิตสามารถ ออกแบบให้ทำอย่างต่อเนื่องได้ การบดผสมด้วย high-energy milling ก่อนการเกิด carbothermic reduction จะช่วยลดเวลาและอุณหภูมิของ carbothermic reduction ซึ่งพบว่า สามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1600 องศาเซลเซียส เนื่องจากการบดผสมใน ลักษณะนี้จะช่วยให้ผลึกของซิลิกาและคาร์บอนมีขนาดลดลง มีผลให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้น

ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอยู่ในช่วง 20-30 นาโนเมตร ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นไป ดังสมการที่ 2.1

 $SiO_{2(s)} + 3C_{(s)} \longrightarrow SiC_{(s)} + 2CO_{(g)} \dots (2.1)$

ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น มีปฏิกิริยาย่อยเกิดขึ้น ซึ่งอธิบายเป็น 3 ขั้นตอนได้ดังนี้ คือ

(1) เกิดการรีดิวซ์ซิลิกาด้วยคาร์บอน ได้ผลลัพธ์เป็นแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ (SiO) และ
 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ดังสมการที่ 2.2

(2) เกิดการรีดิวซ์ซิลิกาด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ดังสมการที่ 2.3 จากนั้นแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์จากสมการที่ 2.3 ทำปฏิกิริยากับคาร์บอน ทำให้มีแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาดังสมการที่ 2.3 และ 2.4 ตามลำดับ

(3) การเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ จากการรวมตัวของแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์กับผงคาร์บอน ดังสมการที่ 2.5 และแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์กับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ดังสมการที่ 2.6

$SiO_{2(s)} + C_{(s)} \longrightarrow$	SiO _(g) + CO _(g)	(2.2)
$SiO_{2(s)} + CO_{(g)} \longrightarrow$	SiO _(g) + CO _{2 (g)}	(2.3)
$C_{(s)} + CO_{2(g)} \longrightarrow$	2CO _(g)	(2.4)
$SiO_{(g)} + 2C_{(s)} \longrightarrow$	SiC _(s) + CO _(g)	(2.5)
$SiO_{(g)}$ + $3CO_{(g)}$ \longrightarrow	$SiC_{(s)}$ + $2CO_{2(g)}$	(2.6)

จากปฏิกิริยาข้างต้น พบว่าขนาดอนุภาคของสารตั้งต้นมีผลต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยา^[2,4,9-12] ถ้าขนาดอนุภาคของสารตั้งต้นเล็กลงทำให้อัตราการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังขึ้นกับโครงสร้างผลึกของสารตั้นต้นด้วย โดยถ้าสารตั้งต้นเป็นแบบอสัณฐาน ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้เร็ว และสามารถใช้เหล็ก (Fe) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) โดยเติมเหล็กไม่ เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของซิลิกา การทำให้เหล็กมีขนาดเล็กมากๆ และมีการกระจายตัวที่ดี จะช่วยให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น^[10]

Junn-Gunn Lee และคณะ^[10] ได้ทำการศึกษาผลของ CO ต่อกลไกการเกิดปฏิกิริยา พบว่า ปริมาณ CO มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัด โดยถ้าปริมาณ CO เพิ่มขึ้น อัตราการ เกิดปฏิกิริยาจะลดลง ดังสมการที่ 2.7

SiC yield (%) =
$$A(P_{CO})^{-1/3}t \exp(-\Delta \varepsilon/RT)$$
(2.7)

โดยที่ A = 4.25x10¹⁶ สำหรับตัวอย่างที่ไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยา (%-atm^{1/3}/min)

- = 2.8x10¹⁰ สำหรับตัวอย่างที่เติมเหล็กประมาณร้อยละ 7.5 (%-atm^{1/3}/min)
- P_{co} = ความดันของ CO (บรรยากาศ, atm)
- t = เวลาในการเกิดปฏิกิริยา (นาที)
- $\Delta \epsilon$ = พลังงานการกระตุ้น
- T = อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา (เคลวิน)

V.M.Kevorkijan และคณะ^[11] ได้ทดลองสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยใช้ผงคาร์บอนที่มี พื้นที่ผิวต่างกัน 2 ชนิด เติมลงในซิลิกาเจล บดผสมในอะซีโตน แล้วเผาในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 1150 และ 1500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5 ถึง 2 ชั่วโมง พบว่าความดันและอุณหภูมิมีผลต่อ ปฏิกิริยา carbothermic reduction โดยมีผลต่อปฏิกิริยาในสมการที่ 2.2 และ 2.5 เมื่อความดันต่ำ มากๆ ปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ ผลการทดลองพบว่า ที่ความดัน 1-2 ปาสคาล ที่ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส สารตั้งต้นร้อยละ 50 เปลี่ยนไปเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยใช้เวลา น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม แก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ (SiO) จะสูญเสียไป เนื่องจากถูกดูดออก จากระบบ ทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำ รูปร่างของผงคาร์บอนที่เติมลงไปมีผลต่อลักษณะของผงซิลิกอน คาร์ไบด์ โดยถ้าผงคาร์บอนมีขนาดเล็ก จะทำให้ได้ซิลิกอนคาร์ไบด์ขนาดเล็กด้วย

ผลของสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน เช่น colloidal silica, quartz, คาร์บอนจาก phenolic resin และ carbon black ผสมกัน พบว่า การเกิดปฏิกิริยาเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ เกิดได้ที่อุณหภูมิ ใกล้เคียงกัน คือ ที่ 1500 องศาเซลเซียส และพบคาร์บอนหลงเหลืออยู่ในตัวอย่างที่ใช้สารตั้งต้น เป็น quartz กับ carbon black และ colloidal silica กับ phenolic resin และลักษณะ โครงสร้างจุลภาคของอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ เป็นผลเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะตัว ของคาร์บอนที่ใช้เป็นสารตั้งต้น นอกจากนี้คาร์บอนที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ยังมีผลต่อความเสถียรของ ซิลิกาอีกด้วย โดย carbon black จะทำให้ซิลิกาเปลี่ยนรูปจากอสัณฐาน หรือ quartz เป็น cristobalite ในขณะที่คาร์บอนจาก phenolic resin ไม่เปลี่ยนรูปกับซิลิกา^[2] Rasit Koc และ Sai V. Chattamanchit ^[4] ใช้วิธี carbothermic reduction ของซิลิกาที่ เคลือบผิวด้วยคาร์บอน เพื่อสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ พบว่า การเคลือบผิวซิลิกาด้วยคาร์บอน ทำ ให้ปฏิกิริยาเกิดได้สมบูรณ์มากขึ้น สารที่สังเคราะห์ได้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น โดยที่ไม่มีการเกาะกัน ของอนุภาค (agglomerate)

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการแผ่ความร้อนจากไมโครเวฟ มาใช้ในการรีดิวซ์ซิลิกา ขนาดละเอียดด้วยคาร์บอน^[3] ซึ่งสามารถผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรได้ การ เตรียมสารตั้งต้นมาจากเจล (gel) แล้วค่อยมาผ่านกระบวนการ carbothermic reduction^[13] เป็น อีกหนึ่งวิธีที่สามารถสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีขนาดละเอียดได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากเป็นวิธีที่ควบคุม morphology ได้ยาก

2.3.2 Direct reaction ของโลหะซิลิกอนและคาร์บอน

วิธีนี้เป็นการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยอาศัยการทำปฏิกิริยากันโดยตรงระหว่างโลหะ ซิลิกอน และคาร์บอน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เป็นดังสมการที่ 2.8 กระบวนการที่นิยมใช้สำหรับการ สังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากโลหะซิลิกอนและคาร์บอน ได้แก่ กระบวนการ carbothermic^[14], microwave reaction^[17] และ mechanical reaction^[18-20] เป็นต้น

$$Si_{(s)} + C_{(s)} \longrightarrow SiC_{(s)} \dots (2.8)$$

Karine Saulig-Wenger และคณะ ^[14] สามารถเตรียม β-SiC nanowire จากการทำ ปฏิกิริยากันโดยตรงระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอน โดยใส่ผงซิลิกอนในครูซิเบิ้ลอะลูมินา แล้วใส่ใน ครูซิเบิ้ลแกรไฟต์อีกที ปิดฝา นำไปเผาที่ 1200 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ตัวอย่างหลังการเผาที่ มีการปล่อยแก๊สไนโตรเจนเข้าไปจะมี β-SiC nanowire เกิดขึ้น โดยมีขนาดผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 10-60 นาโนเมตร ผงที่เหลือเป็นซิลิกอน ในขณะที่เผาในอาร์กอน จะไม่มี nanowire เกิด ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก N₂ ทำปฏิกิริยากับแกรไฟต์เกิดเป็นไอของคาร์บอน-ไนโตรเจน ^[15] แสดงว่าการโต ของ nanowire เป็นลักษณะของ vapor-solid (VS) nucleation process ^[16]

การเกิดบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิต่ำ จากการแผ่รังสีไมโครเวฟ อธิบายได้ว่าความ ร้อนจากการแผ่รังสีเกิดขึ้นตลอดทั้งก้อนตัวอย่าง (bulk) ทำให้การเกิด nucleation และโตขึ้นของ เฟสบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยรังสีไมโครเวฟไปกระตุ้นพันธะในแกรไฟต์ (graphitic bond) เนื่องจากคาร์บอนเป็นตัวที่ไวต่อการรับรังสีไมโครเวฟ (microwave susceptor) แล้วส่งผ่านความร้อนไปยังซิลิกอน เกิดการทำปฏิกิริยากันกลายเป็นบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ข้อได้เปรียบของการเตรียมโดยใช้ไมโครเวฟ คือ สามารถสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ที่ อุณหภูมิต่ำ ในเวลารวดเร็ว และมีความบริสุทธิ์สูง^[3,17]

P.D.Ramesh และคณะ^[17] ทำการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยใช้ซิลิกอน และ ผงคาร์บอน (charcoal powder) เป็นสารตั้งต้น ผงซิลิกอนที่ใช้มีเหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) และ แมกเนเซียม (Mg) เจือปนอยู่ร้อยละ 0.59, 0.11 และ 0.08 ตามลำดับ ส่วนผงคาร์บอนมีคลอไรด์ (Cl) ซัลเฟต (SO₄) และเหล็ก (Fe) เจือปนอยู่ร้อยละ 0.2, 0.2 และ 0.1 ตามลำดับ ปฏิกิริยาเกิดขึ้น ภายใต้ความร้อนจากการแผ่รังสีไมโครเวฟ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1250 เคลวิน นาน 10 นาที ซึ่ง X-ray pattern ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในบรรยากาศปกติ มีพีกของซิลิกา และซิลิกอนรวมอยู่ ด้วย แต่ถ้าใส่ผงคาร์บอนให้มากเกินพอ จะพบแต่พีกซิลิกาเท่านั้น ส่วนกรณีที่เผาในบรรยากาศ ไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น ทำให้ได้ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ไม่มีซิลิกา และ ซิลิกอนปนอยู่เลย

การใช้เทคนิคการเตรียมอัลลอยด์โดยใช้หลักการทางกลเข้าช่วย (mechanical alloying ; MA) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ถูกนำมาใช้สังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ M. Sherif El-Eskandarany และ คณะ^[10] ใช้โลหะซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 300 mesh ผสมกับ คาร์บอนที่มีอนุภาคเล็กกว่า 350 mesh ให้ได้สัดส่วนของซิลิกอน : คาร์บอน เท่ากับ 1:1 ขวดบด และลูกบดเป็นซัฟไฟร์ (sapphire) การบดผสมจะใช้เครื่องบดที่มีการสั่นด้วยพลังงานสูง (high – energy ball mill) และมีการปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าไปในระบบด้วย จากการทดลองพบว่า ผงที่ผ่านการบดผสมนานถึง 300 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จะทำปฏิกิริยากันกลายเป็นบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ ที่ละเอียดมาก มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์เท่ากับ 0.4357 นาโนเมตร ทั้งนี้ตัวแปรต่างๆ เช่น ความเร็วและเวลาที่ใช้ในการบด อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักลูกบดต่อสารที่ใช้ เป็นต้น ล้วนมีผลต่อ สมบัติของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ^[19-20] กลไกในการสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์โดย เทคนิคดังกล่าวนี้สามารถแบ่งตามช่วงเวลาของการบดผสม ได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ข*ึ้นตอนแรก* เป็นขั้นตอนของการเกิดสารเชิงประกอบระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอน คือ ตั้งแต่ 0 ถึง12 ชั่วโมง ของการบดผสม ผงซิลิกอนและคาร์บอนเกิดกระจายตัว แล้วมารวมกัน ความเค้นเฉือน (shear stress) จากการชนกันระหว่างลูกบดกับผงตัวอย่าง มีผลให้ผงตัวอย่าง เปลี่ยนรูปร่างให้มีลักษณะคล้ายแท่ง (rodlike) ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว รูปที่ 2.5 แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคให้เล็กลงเมื่อเพิ่มเวลาในการบดผสม



รูปที่ 2.5 ผลของเวลาในการบดผสมที่มีต่อการกระจายขนาดของผง Si₅₀C₅₀ alloy

ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนของการเกิด solid state reaction ระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอน เกิดเป็นบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการบด 24 ถึง 100 ชั่วโมง โดยถ้าเวลานาน ขึ้นสัดส่วนโดยปริมาตรของบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ก็ยิ่งสูงขึ้น และมีรูปร่างเป็น equiex มากขึ้นด้วย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ไมครอน

ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการทำให้เกิดเฟสของบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ homogeneous มาก ยิ่งขึ้น คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 100 ถึง 300 ชั่วโมง ของการบดผสม ผงตัวอย่างหลังผ่านขั้นตอนนี้จะมี ขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน มีรูปร่างทรงกลม ผิวเรียบ และมีการกระจายขนาดอนุภาคในช่วงแคบ ถ้าใช้เวลาในการบดผสมถึง 300 ชั่วโมง จะมีขนาดผลึกประมาณ 7 นาโนเมตร

นอกจากนี้บรรยากาศในการเผายังมีผลต่อการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากผงซิลิกอน และคาร์บอน ทีมงานของ Jorge Cruz Fernandes^[21] ได้นำส่วนผสมของซิลิกอนกับคาร์บอนที่อัด เป็นเม็ด ไปเผาในเตาแสงอาทิตย์ ที่สามารถควบคุมบรรยากาศการเผาได้ เตาแสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้ ในการทดลองนี้มีส่วนประกอบของกระจกเว้า และมีจุดรวมแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 5 เซนติเมตร จึงสามารถรับแสงได้ที่ความเข้มสูง และสามารถเพิ่มพลังงานความร้อนจากธรรมชาติ ที่มีค่า 800 W/m² ให้เป็น 1350 kW/m² คิดเทียบเป็นค่าอุณหภูมิได้เท่ากับ 1650 องศาเซลเซียส การที่ความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ทำให้ผงตัวอย่างทำปฏิกิริยากันกลายเป็น ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สมบูรณ์ในกรณีที่เผาในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอน แต่การเผาในบรรยากาศ ของไนโตรเจน พบว่ายังมีซิลิกอนเหลือปนอยู่ในตัวอย่าง

อีกวิธีหนึ่ง คือ Self-propagating high temperature synthesis (SHS)^[22] โดยอาศัยหลัก ของการคายความร้อน (exothermic) จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างซิลิกอนและคาร์บอนที่ ignition temperature (1250 ถึง 1700 องศาเซลเซียส) ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการเตรียมบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยเช่นกัน

2.3.3 Thermal decomposition ของสารพอลิเมอร์ชนิดออแกโนซิลิกอน (organosilicon polymer)

Thermal decomposition เป็นการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยการให้ความร้อนแก่สาร พอลิเมอร์ชนิดออแกโนซิลิกอน (organosilicon polymer) ^[7-8,23-27] ซึ่งมีธาตุซิลิกอนและคาร์บอน เป็นองค์ประกอบในบรรยากาศของแก๊สไฮโดรเจน แก๊สเฉื่อย หรือสุญญากาศ สิ่งสำคัญสำหรับ การเตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีนี้ คือ สารตั้งต้นที่ใช้จะต้องมีอัตราส่วนของซิลิกอน และคาร์บอน ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้มีคาร์บอนหลงเหลืออยู่หลังจากการเผา สารพอลิเมอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ ใดคลอโรเมทิลไซเลน (CH₃SiHCl₂), ไตรคลอโรเมทิลไซเลน (CH₃SiCl₃)^[7,8] ปฏิกิริยาเมื่อได้รับความ ร้อนของสารทั้ง 2 ชนิด แสดงดังสมการที่ 2.9 และ 2.10 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมี พอลิคาร์โบ-ไซเลน, พอลิไซเลน และพอลิคาร์โบไซโลเซน (Yajima และคณะ, 1981; Schilling และคณะ, 1983)^[7] เป็นต้น รูปที่ 2.6 แสดงกลไกของปฏิกิริยาของพอลิคาร์โบไซเลน ในระหว่างการผ่าน ความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ^[23]

$$CH_{3}SiHCl_{2} \xrightarrow{1000-1500 \circ C} SiC + 2HCI + H_{2} \qquad \dots (2.9)$$

$$CH_{3}SiCl_{3} \xrightarrow{>1100-1900 \circ C} SiC + 3HCI + H_{2} \qquad \dots (2.10)$$



รูปที่ 2.6 กลไกของปฏิกิริยาของพอลิคาร์โบไซเลน ในระหว่างการผ่านความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ ต่างๆ

ปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์ โดยใช้โคพอลิเมอร์ซึ่งเกิดจาก การเชื่อมพันธะระหว่างพอลิเมอร์สองชนิดมาใช้ในการเตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วย ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ West และคณะ^[24-26] ที่ใช้พอลิไซลาสไตรีน ซึ่งเกิดจากการเชื่อมพันธะกันระหว่าง ไดเมทิลไดคลอโรไซเลนกับฟีนิลเมทิลไดคลอโรไซเลน มาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูง เพื่อทำให้ได้ บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

Venkatasubbaiah Krishnan และคณะ^[27] ใช้ไดไวนิลเบนซีน ซึ่งเกิดจากการเชื่อมพันธะ กันระหว่างไดเมทิลไดคลอโรไซเลนกับพีนิลเมทิลไดคลอโรไซเลน มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการ สังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยนำไดไวนิลเบนซีนมาผ่านกระบวนการทางเคมี และความร้อน พบว่า ไดไวนิลเบนซีน สามารถเปลี่ยนไปเป็นบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ เมื่อผ่านความร้อนที่ อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส กลไกของปฏิกิริยาดังกล่าวแสดงดังสมการที่ 2.11 บีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดระดับนาโน และมีการกระจายของขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 8-12 นาโนเมตร



วิธีนี้สามารถสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความละเอียด และบริสุทธิ์สูง อุณหภูมิในการ สังเคราะห์ไม่สูงมากนัก ส่วนข้อด้อยของวิธีนี้คือ ปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จะน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณของสารตั้งต้น และจะมีแก๊สพิษเกิดขึ้น เช่น แก๊สไฮโดรคาร์บอน แก๊สมีเทน เป็นต้น

2.3.4 Gas phase synthesis

การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis นี้ส่วนมากแล้วสารตั้งต้นที่ ใช้มักเป็นสารจำพวกไซเลน (SiH₄) หรือคลอโรไซเลน (SiCl₄) ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคาร์บอน หรือ ไฮโดรเจน เมื่อพิจารณาตามหลักเทอร์โมไดนามิก จะเห็นได้ว่าชนิดของไฮโดรคาร์บอนไม่ใช่เรื่อง สำคัญ ดังนั้นจะเลือกใช้ชนิดใดก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือ จำนวนโมลของ Si, C และ H ที่สภาวะสมดุล

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis นี้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction) ดังนั้น จะต้องมีพลังงานจากภายนอกเข้าไป ช่วยรักษาอุณหภูมิของปฏิกิริยาไว้ ตารางที่ 2.2 แสดงปฏิกิริยาทั้งหมดในการสังเคราะห์ซิลิกอน คาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis^[8]

Reaction	$\Delta {\rm H_{R}}$ (298K)	$\Delta { m G}_{ m R}$ (298K)	Τ _G	$\Delta H_{R}^{}$ (T _G)
	(kJ/mol)	(kJ/mol)	(K)	(kJ/mol)
$SiCl_4 + Cl_4 = SiC(\beta) + 4Cl_2$	142.9	162.0	2694	156.3
$SiCl_4 + CH_4 = SiC(\beta) + 4HCl$	287.5	214.0	1140	290.7
$HSiCl_3 + CH_4 = SiC(\beta) + 3HCl + H_2$	317.4	272.2	1901	322.7
$H_2SiCl_2 + CH_4 = SiC(\beta) + 2HCI + 2H_2$	151.8	98.5	793	165.9
$SiH_4 + CH_4 = SiC(\beta) + 4H_2$	-28.9	-73.2	Δ G<0	-
$Si(CH_3)_4 = SiC(\beta) + 3CH_4$	-11.2	-75.0	Δ G<0	-
$SiCl_4 + 1/2C_2H_2 + 3/2H_2 = SiC(\beta) + 4HCl$	99.3	58.6	753	92.5
$SiCl_4 + 1/2C_2H_4 + H_2 = SiC(\beta) + 4HCl$	186.5	129.1	977	182.3
$SiCl_4 + 1/3C_3H_8 + 4/3H_2 = SiC(\beta) + 4HCl$	247.3	196.9	1648	211.5
$1/2Si_{2}H_{6} + 1/2C_{2}H_{4} = SiC(\beta) + 5/2H_{2}$	-65.0	-79.0	Δ G<0	-

ตารางที่ 2.2 ปฏิกิริยาทั้งหมดในการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis

ปัจจุบันการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธี Gas phase synthesis ที่นิยมกันมากได้แก่ เทคนิค chemical vapor deposition (CVD)^[28-30] และ chemical vapor infiltration (CVI)^[31-33] ซึ่งสารตั้งต้นที่นิยมใช้คือ ethyltrichlorosilane (ETS) และ methyltrichlorosilane (MTS) เพราะ สามารถเตรียมได้ในความดันไม่ต่ำมากนัก (10⁻³ torr) ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสมการที่ (2.12) และ (2.13)

$$C_{2}H_{5}SiCI_{3} (ETS) + H_{2(g)} \longrightarrow SiC_{(s)} + 3HCI_{(g)} + CH_{4(g)} \qquad \dots (2.12)$$

$$CH_{3}SiCI_{3} (MTS) + H_{2(g)} \longrightarrow SiC_{(s)} + HCI_{(g)} + 2H_{2(g)} \qquad \dots (2.13)$$

วิธีดังกล่าวนี้จะให้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความดันของแก๊สไฮโดรเจน และปริมาณของ vapor ที่ถูกปล่อยเข้าไปใน reactor นิยมใช้เตรียม ฟิล์มบางของซิลิกอนคาร์ไบด์บน substrate หรือใช้เตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นเมตริกซ์ไป deposite ลงบนซิลิกอนคาร์ไบด์ไฟเบอร์เพื่อเตรียมสารเชิงประกอบซิลิกอนคาร์ไบด์ไฟเบอร์/ ซิลิกอนคาร์ไบด์

2.3 การนำซิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้ประโยชน์

ชิลิกอนคาร์ไบด์เป็นสารเซรามิกที่มีสมบัติเด่นหลายประการ อาทิเช่น มีความแข็งแรงสูง มี ความต้านทานต่อปฏิกิริยาทางเคมี ทนทานต่อการสึกกร่อน นำความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา เป็นต้น สมบัติของซิลิกอนคาร์ไบด์ แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 ทำให้มีการนำซิลิกอนคาร์ไบด์มาใช้ในงาน หลายๆ ด้าน โดยยุคแรกๆ นิยมนำไปใช้เป็นวัสดุขัดถู และวัสดุทนไฟ แต่เมื่อมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้ได้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีคุณภาพดีขึ้น จึงมีการนำผงซิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้ในการ ผลิตเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานทางด้านวิศวกรรม ตลอดจนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และมี แนวโน้มที่จะมีการนำไปใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รูปที่ 2.7 แสดงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำมาจาก ซิลิกอนคาร์ไบด์^[34-37]

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นสารหลัก มีหลายชนิด สามารถแบ่ง เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามการนำไปใช้งานได้ 6 กลุ่ม^{เ8} ดังนี้

- กลุ่มที่ใช้ในงานที่ต้องการความทนทานต่อการเสียดสี เช่น กระสวย (thread guides), bearing, pump seal, abrasive waterjet cutting เป็นต้น
- 2. กลุ่มที่ใช้เป็นอาวุธ
- กลุ่มที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง เช่น ceramic burners, special crucibles และ thermocouple protection tube เป็นต้น
- 4. กลุ่มที่ใช้ในงานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกกร่อน เนื่องจากสารเคมี หรือแก๊ส เช่น engine exhaust port เป็นต้น
- 5. กลุ่มที่ใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น turbo-exchanger, piston pin และ turbine เป็นต้น
- 6. กลุ่มที่ใช้งานทางด้านไฟฟ้า เช่น semiconductor และ substrate เป็นต้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย



รูปที่ 2.7 ชิ้<mark>นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำมาจาก</mark>ซิลิกอนคาร์ไบด์



บทที่ 3

การทดลองและการวิเคราะห์ทดสอบ

ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์วัตถุดิบ การวิเคราะห์สารที่สังเคราะห์ได้ และการทดสอบ ชิ้นงานที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ โดยทำการทดสอบทั้งทางกายภาพ และ ทางกล รวมถึงวิธีการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ และวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานจากผงบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้

3.1 การวิเคราะห์วัตถุดิบและสารที่สังเคราะห์ได้

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทดลอง คือ ผงโลหะซิลิกอน และคาร์บอนแบล็ก ส่วนสารตัวเติมที่ใช้ ในขั้นตอนของการเตรียมชิ้นงานจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้มี 2 ชนิด ได้แก่ ผงอะลูมินา และผงอิทเทรีย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ชื่อสาร	บริษัทผลิต	ข้อมูลเฉพาะ
ผงซิลิกอน (Si)	Riedel-DeHaën	97%, สีเทา, ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 12 ไมโครเมตร
ผงคาร์บอนแบล็ก-1,	ไทยคาร์บอนแบล็ก	99%, ก้อนแกรนูลสีดำเข้ม, พื้นที่ผิว 76.13 ตารางเมตร
(C1)	จำกัด (มหาชน)	ต่อกรัม
ผงคาร์บอนแบล็ก-2,	ไทยคาร์บอนแบล็ก	99%, ผงละเอียดสีดำเข้ม, พื้นที่ผิว 69.98 ตารางเมตร
(C2)	จำกัด (มหาชน)	ต่อกวัม
อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Showadenko	99.99%, สีขาว, ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 0.6 ไมโครเมตร
อิทเทรีย (Y ₂ O ₃)	Aldrich chemical	99.99%, สีขาว, ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 5.2 ไมโครเมตร

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 การวัดการกระจายขนาดอนุภาค

การวัดการกระจายขนาดอนุภาค วัดโดยเครื่อง Centrifugal Particle Size Analyzer รุ่น SA-CP3L ผลิตโดยบริษัท Shimadzu Corporation การเตรียมตัวอย่างในการวัด เริ่มจากการนำสารมา ทำให้เกิดการกระจายตัวในสารละลายโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต (sodium hexametaphosphate; Na₂(PO₄)₃) ความเข้มข้น 0.2 % โดยน้ำหนัก โดยการสั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิกส์ประมาณ 15 นาที จนเกิดการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นใช้หลอดหยดสาร (dropper) สุ่มดูดสารมาวิเคราะห์ การกระจายขนาดอนุภาค ซึ่งในการวัดของเครื่องมือนี้ อาศัยการวัดความเข้มของแสงที่ส่องผ่าน อนุภาค เพื่อวัดปริมาณที่เวลาใดๆ และคำนวณขนาดอนุภาคโดยใช้สมการของ Stoke ดังสมการ ที่ 3.1

$$D = \sqrt{\frac{18\eta L}{(S-S_0)gt}} \qquad \dots \dots (3.1)$$

โดยที่

D = เส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค (เซนติเมตร) **η** = ความหนืดของของเหลว (พอยส์)

L = ระยะทางที่อนุภาคตก (เซนติเมตร)

S = ความถ่วงจำเพาะของสาร

S₀ = ความถ่วงจำเพาะของของเหลว

g = แรงโน้มถ่วงโลก (980 เซนติเมตรต่อวินาที²)

3.1.2 การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาค

ศึกษาลักษณะ ขนาด รูปร่าง และการกระจายตัวของอนุภาค ตลอดจนขนาดของรูพรุนและ รอยแตก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) รุ่น JSM-T330 A ผลิตโดยบริษัท JEOL และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยายสูง (Field emission scanning electron microscope, FE-SEM) รุ่น JSM-6340F ผลิตโดยบริษัท JEOL ดังรูปที่ 3.1 ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์เป็นได้ทั้งผง และชิ้นงาน (แผ่น แท่ง เม็ด ฯลฯ) การเตรียม ตัวอย่างทำดังนี้

ตัวอย่างที่เป็นผง ในกรณีที่ผงตัวอย่างมีขนาดอนุภาคค่อนข้างใหญ่ เช่น ผงซิลิกอน ผง คาร์บอนแบล็กชนิดแกรนูล เป็นต้น สามารถเตรียมได้โดยโรยผงตัวอย่างลงบนแท่งรอง (stud) ที่ติด คาร์บอนเทปไว้ ให้ผงตัวอย่างกระจายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนกรณีที่ผงตัวอย่างมีขนาดอนุภาคเล็ก เช่น ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จากภาวะต่างๆ เตรียมได้โดยผสมผงตัวอย่างกับอะซีโตน แล้ว นำไปสั่นให้อนุภาคเกิดการกระจายตัวด้วยเครื่องอัลตราโซนิกส์ประมาณ 20 นาที แล้วใช้หลอดหยด หยดสารลงบนแท่งรอง ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเคลือบผิวด้วยทองโดยการ sputtering เพื่อให้เกิดสภาพ นำไฟฟ้า แล้วให้อิเล็กตรอนที่ค้างบนผิวตัวอย่างถูกปล่อยออกไป แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างจุลภาค
ตัวอย่างที่เป็นชิ้นงาน การเตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจลักษณะพื้นผิว โดยทั่วไปนำตัวอย่าง มาติดกับแท่งรองที่มีเทปคาร์บอนติดอยู่ แล้วนำไปเคลือบผิวด้วยทอง เพื่อให้เกิดการนำไฟฟ้า แล้วจึง นำมาตรวจดูลักษณะพื้นผิว และการกระจายของรูพรุน และลักษณะผิวที่แตก ซึ่งเกิดหลังจากการ ทดสอบความแข็งแรง



รูปที่ 3.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยายสูง (Field emission scanning electron microscope, FE-SEM) รุ่น JSM-6340F

3.1.3 การศึกษ<mark>าโครงสร้างผลึก</mark>

ศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึกโดยใช้เครื่อง X-ray diffractometer รุ่น XRD 6000 ผลิตโดย บริษัท Shimadzu Corporation โดยใช้รังสี CuKα₁ ที่มีความยาวคลื่น 1.54056 นาโนเมตร สามารถ วิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นผง และเป็นชิ้นงาน โดยสามารถเตรียมตัวอย่างได้ดังนี้

ตัวอย่างที่เป็นผง การเตรียมตัวอย่างทำโดยนำผงตัวอย่างอัดให้แน่นบนแผ่นรอง (sample holder) โดยต้องให้ผิวหน้าได้ระนาบเดียวกับขอบของแผ่นรอง

ตัวอย่างที่เป็นชิ้นงาน ต้องนำชิ้นงานไปขัดผิวให้เรียบก่อนนำไปติดกับแผ่นรอง โดยให้ผิวด้าน ที่ขัดอยู่ในระนาบเดียวกับขอบของแผ่นรอง เมื่อเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว นำไปวัดโดยใช้ช่วงมุม 20 ตั้งแต่ 20 ถึง 80 องศา นำกราฟ XRD ที่บันทึกได้เปรียบเทียบกับการ์ดมาตรฐาน JCPDS

3.1.4 การวัดพื้นที่ผิวโดย gas adsorption

วัดพื้นที่ผิวของผงซิลิกอน ผงคาร์บอนแบล็ก และผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ โดย วิธี BET จากเครื่อง Surface Area Analyzer รุ่น Autosorb-1 ที่ผลิตโดยบริษัท Quantachrome Corporation โดยต้องนำผงตัวอย่างไปอบแห้ง หลังจากนั้นนำมาใส่กระเปาะของแท่งแก้วทดสอบ แล้วนำไปหาค่าพื้นที่ผิว โดยเครื่องจะทำการวัดพื้นที่ผิวโดยอาศัยการดูดซับแก๊สไนโตรเจนของผิว อนุภาคเต็ม 1 ชั้น แล้วนำมาคำนวณหาพื้นที่จากพื้นที่หน้าตัด และคำนวณโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน ที่ถูกดูดซับ 1 ชั้น ได้จากสมการ

$$S_{T} = N_{m}A_{cs} \qquad \dots \dots (3.2)$$

โดยที่ S_T = พื้นที่ผิวทั้งหมด N_m = จำนวนโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับทั้งหมดบนพื้นผิว 1 ชั้น A_{cs} = พื้นที่หน้าตัดของโมเลกุลที่ถูกดูดซับ (สำหรับไนโตรเจน โดยทั่วไปใช้ค่า 16.2 X 10⁻²⁰ ตารางเมตร)

เมื่อแทนที่ค่า N_m ดังสมการที่ 3.3 ลงในสมการที่ 3.2 จะได้เป็นดังสมการ 3.4

3.1.5 การวัดความหนาแน่น

ค่าความหนาแน่นของผงซิลิกอน ผงคาร์บอนแบล็ก และผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ ได้จากภาวะต่างๆ วัดโดยใช้เครื่อง AccuPyc 1330 Pycnometer ผลิตโดยบริษัท Micromeritics เครื่องนี้ใช้หลักการแทรกซึมของแก๊สฮีเลียม (He) เข้าไปในสารตัวอย่าง ความหนาแน่นของตัวอย่าง สามารถคำนวณได้จากน้ำหนักของตัวอย่างซึ่งต้องทราบก่อนที่จะทำการวัด กับปริมาตรของตัวอย่าง ซึ่งได้จากการคำนวณผลการเปลี่ยนแปลงของความดันภายในระบบ เมื่อปล่อยให้แก๊สฮีเลียมถูกดูด ซับบนตัวอย่างในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามทฤษฎีดังนี้

เมื่อปล่อยแก๊สเข้าไปในเซลแก๊สจะแทรกซึมเข้าไปในตัวอย่างจนได้ปริมาตรของตัวอย่าง ดังสมการ

$$V_{\text{samp}} = V_{\text{cell}} - V_{\text{gas}} \qquad \dots \dots (3.5)$$

มวลของสาร (m) ได้มาจากการชั่ง ดังนั้น

ความหนาแน่น (ρ) = m(3.6) (V_{cell} - V_{gas})

แต่เนื่องจากแก๊สมีการหด และขยายตัว ดังนั้นจึงออกแบบเซลให้มี 2 เซล ดังรูปข้างล่างนี้



โดยระบบอยู่ในสภาวะปกติ คือ ความดันบรรยากาศ (P₂) อุณหภูมิห้อง (T₂) เมื่อปล่อยแก๊ส เข้าไปใน sample cell ด้วยความดัน P₁ ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้



จากทั้ง 3 สมการ จะได้

$$P_2(V_{cell} - V_{samp} + V_{exp}) = P_1(V_{cell} - V_{samp}) + P_aV_{exp}$$
(3.8)

$$V_{\text{samp}} = V_{\text{cell}} - \frac{V_{\text{exp}}}{\left(\frac{P_1 - P_a}{P_2 - P_a}\right) - 1} \qquad \dots (3.9)$$

โดย P₁, P₂, P_a ได้จากการวัดโดย Pressure Transducer และหาความหนาแน่นได้จากสมการ

3.1.6 การตรวจวัดค่าร้อยละของน้ำหนักที่หายไป

เม็ดงาน (pellet) ที่เตรียมได้ ถูกนำมาคำนวณหาร้อยละของน้ำหนักที่หายไป โดยซั่งน้ำหนัก ของเม็ดงานก่อนและหลังเผา แล้วนำมาคำนวณดังสมการที่ 3.11

> % weight loss = $\frac{W_1 - W_2}{W_1}$ X 100(3.11) เมื่อ % weight loss = ร้อยละของน้ำหนักที่หายไป W₁ = น้ำหนักของเม็ดงานก่อนเผา

> > น้ำหนักของเม็ดงานหลังเผา

3.1.7 การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ

W_o

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงวัตถุดิบ โดยใช้เครื่อง Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) ผลิตโดยบริษัท Noran ซึ่งต่ออยู่กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) รุ่น JSM-T330 A ผลิตโดยบริษัท JEOL การเตรียม ตัวอย่างทำในลักษณะเดียวกันกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาค

3.1.8 การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนโดยรวม (Total Oxygen)

นำผงซิลิกอนไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนโดยรวม ก่อนนำมาใช้สังเคราะห์บีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ โดยใช้เครื่อง Nitrogen/Oxygen Determinator รุ่น TC-436DR ซึ่งมี Electrode Furnace ประกอบอยู่ด้วย ปริมาณออกซิเจนถูกวัดโดยอินฟาเรด การวัดเริ่มจากการวางครูซิเบิ้ลระหว่าง อิเล็กโตรดทั้งสองในเตา ปิดครูซิเบิ้ล และเป่าไล่แก๊สในบรรยากาศทั้งหมดออกไป การส่งผ่านของ กระแสไฟฟ้าแรงสูงไปยังครูซิเบิ้ล ทำให้ครูซิเบิ้ลเกิดความร้อนสูงไปไล่แก๊สที่อยู่ภายในออกมา จากนั้น ชอฟท์แวร์ของเครื่องจะสั่งให้ส่งตัวอย่างลงในครูซิเบิ้ล แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปยังครูซิเบิ้ลเกิดเป็นแก๊ส ไล่แก๊สออกจากตัวอย่าง ออกซิเจนที่ออกจากตัวอย่างจะรวมกับคาร์บอนจากครูซิเบิ้ลเกิดเป็นแก๊ส คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) กรณีที่ปริมาณออกซิเจนสูงจะเกิดแก๊สเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

3.1.9 การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอิสระ (Free C) ที่หลงเหลืออยู่

วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอิสระที่มีอยู่ในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้เครื่อง RC-412 Multiphase Carbon/Moisture Determinator ทำการวิเคราะห์โดยการเผาในบรรยากาศ ออกซิเดชัน ซึ่งคาร์บอนอิสระจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อวิเคราะห์เสร็จซอฟท์ แวร์ของเครื่องจะคำนวณเป็นร้อยละของคาร์บอนอิสระที่มีอยู่ในตัวอย่าง

3.1.10 การวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ (Free Si) ที่หลงเหลืออยู่

วิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระที่มีอยู่ในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้ มาตรฐาน JIS R 1616-1994 "Methods for chemical analysis of fine silicon carbide powders for fine ceramics" ในข้อที่ 8 กล่าวถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณของซิลิกอนอิสระ โดยใช้หลักการเกิด ของแก๊สไฮโดรเจนภายในระบบ^[38] จากการทำปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอน โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และน้ำ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสมการที่ 3.12

Si + 2NaOH +
$$H_2O \longrightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 + 340 \text{ kJ/mol}$$
(3.12)

การวิเคราะห์เริ่มจากการประกอบซุดอุปกรณ์ดังรูปที่ 3.2 แล้วปล่อยน้ำเข้าไปใน allihn condenser รอให้อุณหภูมิของน้ำคงที่ จากนั้นชั่งผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ 5 กรัม ใส่ลงใน flask เติม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป ปิด flask ด้วยจุกยางที่เจาะรูตรงกลางเพื่อต่อเข้ากับปลายของ allihn condenser ได้ จากนั้นนำ heater วางไว้ด้านล่าง ใส่น้ำที่มีกรดซัลฟูริกกับสารละลายเมทิล-ออเร้นจ์ผสมอยู่ในขวดปรับระดับ แล้วยกขวดขึ้นเพื่อปรับระดับน้ำในบิวเรตให้เท่ากับสเกลศูนย์ของ บิวเรต แล้ววางไว้ที่ตำแหน่งนั้น ใช้ข้อต่อเชื่อมที่ด้านบนระหว่างบิวเรตกับ allihn condenser ระวัง อย่าให้มีรอยรั่ว อ่านสเกลเริ่มต้นของบิวเรต เปิด heater รอให้ส่วนผสมใน flask เดือดนาน 90 นาที จากนั้นเลื่อน heater ออกไป แล้วนำบีกเกอร์ที่ใส่น้ำไว้เข้าไปแช่ flask แทน เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึง จุดก่อนเกิดปฏิกิริยา (before reaction) ให้อ่านสเกลของบิวเรต วัดอุณหภูมิห้อง และความดัน บรรยากาศ (อุณหภูมิห้องในขณะทำการทดลองไม่ควรแกว่งเกิน 3 องศาเซลเซียส) ในการทดลองนี้ ทำในกรณีที่ไม่มีผงตัวอย่างอยู่ด้วยเพื่อเป็นซุดอ้างอิง

คำนวณหาปริมาณซิลิกอนอิสระได้จากสมการ 3.13

Free Si =
$$(V_1 - V_2) \times f \times 0.000627 \times 100$$
(3.13)
m

โดยที่ Free Si = ปริมาณของซิลิกอนอิสระ (ร้อยละโดยน้ำหนัก)
 V₁ = ปริมาตรของไฮโดรเจนที่ได้จากการทดลองที่มีผงตัวอย่างอยู่ด้วย (มิลลิลิตร)
 V₂ = ปริมาตรของไฮโดรเจนที่ได้จากการทดลองที่ไม่มีผงตัวอย่างอยู่ด้วย (มิลลิลิตร)
 f = correction factor
 m = มวลของตัวอย่าง (กรัม)

ซึ่ง correction factor (f) คำนวณได้จากสมการที่ 3.14

f =
$$273 X (p-p')$$
(3.14)
(273 + t) X 101.3

โดยที่ p = ความดันบรรยากาศ (กิโลปาสคาล) p' = ความดันของไอน้ำที่ t องศาเซลเซียส (ที่ 25 องศาเซลเซียส = 3.1676 กิโลปาสคาล)

t = อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิที่คงที่ของน้ำ (25 องศาเซลเซียส)



รูปที่ 3.2 ชุดประกอบสำหรับวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

3.2 การทดสอบชิ้นงานที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้

3.2.1 การตรวจวัดค่าร้อยละของน้ำหนักที่หายไป

ชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมได้ ถูกนำมาคำนวณหาร้อยละของน้ำหนักที่หายไป โดยซั่งน้ำ หนักของชิ้นงานก่อนซินเทอร์และหลังซินเทอร์ แล้วนำมาคำนวณดังสมการที่ 3.11

3.2.2 การวัดค่าร้อยละของการห<mark>ด</mark>ตัว

นำชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการซินเทอร์มาคำนวณร้อยละของการหดตัวหลังจากการ ซินเทอร์เปรียบเทียบกับขนาดของชิ้นงานก่อนซินเทอร์ ดังสมการที่ 3.15

% shrinkage = $l_1 - l_2 \times 100$ (3.15)

เมื่อ	% shrinkage	=40	ร้อยละของการหดตัว
	I,	=	ขนาดของชิ้นงานก่อนซินเทอร์
	I ₂	=	ขนาดของชิ้นงานหลังซินเทอร์

3.2.3 การวัดความหนาแน่นและความพรุนตัว

ค่าความหนาแน่นและความพรุนตัวของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ หาได้จากวิธีการแทนที่น้ำ โดยนำชิ้นงานไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105-110 องศาเซลเซียส แล้วปล่อยให้เย็นลง นำไปชั่งน้ำหนักแห้ง แล้วนำชิ้นงานใส่หม้อสุญญากาศ จากนั้นเปิดปั้มที่ต่ออยู่กับหม้อสุญญากาศเพื่อดูดอากาศออก จนกระทั่งมีความดันภายในอยู่ที่ประมาณ 100 กิโลปาสคาล นาน 30 นาที จึงค่อยเติมน้ำลงไปใน ภาชนะที่ใส่ชิ้นงานเพื่อให้น้ำเข้าไปแทนที่อากาศในรูพรุน เปิดปั้มดูดเอาอากาศออกอีก 60 นาที นำชิ้นงานไปชั่งน้ำหนักในน้ำ หลังจากนั้นใช้ผ้าเปียกชื้นชับน้ำที่ผิวชิ้นงานออก แล้วชั่งน้ำหนักของ ชิ้นงานที่อิ่มตัวด้วยน้ำ นำค่าที่ได้มาคำนวณหาความหนาแน่น และความพรุนตัวของชิ้นงาน ตาม สมการที่ 3.16 และ 3.17 ตามลำดับ

Bulk Density =
$$W_d$$
(3.16)
 $W_{sat} - W_{sus}$

Apparent porosity =
$$\begin{bmatrix} W_{sat} - W_{d} \\ \hline W_{sat} - W_{sus} \end{bmatrix}$$
 X 100(3.17)

ค่าความหนาแน่นเชิงทฤษฎี (Theoretical Density, TD)

$$TD = \frac{W_{total}}{W_a/\rho_a + W_b/\rho_b + W_c/\rho_c + \dots}$$
(3.18)

เมื่อ	W _{total}	=	น้ำหนักรวมทั้งหมด
	W _a , W _b , W _c	=	<mark>น้ำหนักของสาร a, b แ</mark> ละ c ตามลำดับ
	$ ho_{a}$, $ ho_{b}$, $ ho_{c}$	= 0	ความหนาแน่นของสาร a, b และ c ตามลำดับ
	a, b, c,	=39	สารที่ใช้

โดยความหนาแน่นเชิงทฤษฎีของสารต่างๆ มีค่าดังนี้

ซิลิกอนคาร์ไบด์ 🔍	มีความหนาแน่น 3.21 กรัมต่อลูก <mark>บา</mark> ศก์เซนติเมตร
อะลูมินา	มีความหนาแน่น 3.99 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
อิทเทรีย	มีความหนาแน่น 4.83 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ค่าความหนาแน่นเชิงสัมพัทธ์ (Relative Density)

ค่าความหนาแน่นเชิงสัมพัทธ์ คือ การเปรียบเทียบระหว่างความหนาแน่นของ ชิ้นงานกับความหนาแน่นเชิงทฤษฎี สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.19

> Relative Density = Bulk Density X 100(3.19) Theoretical Density

3.2.4 ความทนแรงดัดโค้ง (Bending Strength)

ทดสอบความทนแรงดัดโค้งของชิ้นงาน โดยใช้เครื่อง universal testing machine รุ่น 4469 ยี่ห้อ Instron ดังรูปที่ 3.3 ทดสอบโดยวิธี 4-point flexural ตัดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบให้มีขนาดความยาว ประมาณ 35 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และกว้าง 4 มิลลิเมตร จากนั้นขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษ ซิลิกอนคาร์ไบด์เบอร์ #800 และ #1000 ตามลำดับ แล้วขัดต่อด้วยผงขัดเพชรเบอร์ 15 ไมครอน ลบ เหลี่ยมลงมา 0.2 มิลลิเมตร โดยทำมุม 45 องศากับระนาบของด้านบน^[39] นำไปทดสอบความทนแรง ดัดโค้ง โดยฐานที่ใช้รองรับตัวอย่าง (span) ยาว 30 มิลลิเมตร และมีจุดให้แรง 2 จุดอยู่ด้านบน มีระยะห่างกัน 10 มิลลิเมตร กำหนดอัตราเร็วของหัวกดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที นำค่าแรงสูงสุด ที่ได้มาคำนวณหาความทนแรงดัดโค้งของชิ้นงานตัวอย่างจากสมการที่ 3.20



รูปที่ 3.3 เครื่อง universal testing machine รุ่น 4469 ยี่ห้อ Instron

$$\sigma = \frac{3P(L-I)}{2wt^2} \qquad \dots (3.20)$$

โดยที่	σ	=	ความทนแรงดัดโค้ง (เมกะปาสคาล)
	Р	=	ค่าแรงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นงานหัก (นิวตัน)
	L	=	ระยะห่างของฐานรองรับด้านล่าง (มิลลิเมตร)
	I	=	ระยะห่างระหว่างจุดให้แรงด้านบน (มิลลิเมตร)
	W	=	ความกว้างของชิ้นงาน (มิลลิเมตร)
	t	=	ความหนาของชิ้นงาน (มิลลิเมตร)

3.2.5 ความแข็ง (Hardness)

ค่าความแข็งของชิ้นงานวัดโดยใช้หัวกดวิคเกอร์ส (Vickers) โดยใช้เครื่องวัดความแข็งรุ่น DVK-2 No. DV 6133 ผลิตโดยบริษัท Matsuzawa Seiki Co,Ltd. นำชิ้นงานที่หักจากการวัดความ ทนแรงดัดโค้ง มาขัดด้วยผงขัดเพชรขนาด 6 ไมครอน 3 ไมครอน และ 1 ไมครอน ตามลำดับ จน ผิวชิ้นงานมีลักษณะมันวาว นำไปทดสอบความแข็งโดยใช้หัวกดวิคเกอร์สที่มีลักษณะเป็นรูปปีรามิด ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุมระหว่างด้านตรงข้ามเท่ากับ 136 องศา โดยใช้แรงกด 98 นิวตัน ความเร็วใน การให้แรงกดเท่ากับ 70 ไมครอนต่อวินาที และคงแรงกดไว้นาน 15 วินาที วัดเส้นทแยงมุมของรอย กดทั้งสองด้าน ดังรูปที่ 3.4 แล้วหาค่าเฉลี่ย นำค่าที่ได้มาคำนวณค่าความแข็งตามสมการที่ 3.21

 $HV = 0.1891 X (F/d^2)$ (3.21)



รูปที่ 3.4 รอยกดจากหัวกดวิคเกอร์ส

3.3 กระบวนการสังเคราะห์ผงบีตา – ชิลิกอนคาร์ไบด์

กระบวนการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีการบดผสมผงโลหะ ซิลิกอนกับคาร์บอนแบล็กเข้าด้วยกัน แล้วนำไปเผาที่ภาวะต่างๆ รายละเอียดของกระบวนการ สังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ แสดงดังรูปที่ 3.5 โดยชั่งผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็กใน ้อัตราส่วน 1:1 แล้วนำไปบดผสมนาน 16 ชั่วโมง ในขวดบดพอลิเอทิลีน ลูกบดอะลูมินา และใช้ เอทิลแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 เป็นตัวกลาง นำส่วนผสมหลังบดไปอบที่อุณหภูมิ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นแยกลูกบดออกแล้วบดให้ละเอียดด้วยโกร่งก่อนนำไป ้อัดขึ้นรูปเป็นเม็ด pellet ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิกที่ให้ความ ดันในทิศทางเดียว ใช้ความดันประมาณ 62 เมกะปาสคาล จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน และสภาพสุญญากาศ โดยใช้เตาควบคุม บรรยากาศ รุ่น High-Multi 500 FV PHP-R-5 FRET-25 ดังแสดงในรูป 3.6 ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที รักษาอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงสุดนาน 1 และ 3 ชั่วโมง แล้วค่อยลด อุณหภูมิลง กราฟการเผาแสดงดังรูปที่ 3.7 จากนั้นทำการบดเม็ด pellet ให้เป็นผง และวิเคราะห์ สมบัติของสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ โดยการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของสารด้วย ้เครื่อง XRD ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของสารด้วยเครื่อง FE-SEM พื้นที่ผิวของอนุภาคด้วยวิธี BET และวิเคราะห์หาปริมาณธาตุซิลิกอน และคาร์บอนอิสระ ตารางที่ 3.2 แสดงภาวะต่างๆ ที่ใช้ สังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์



รูปที่ 3.5 กระบวนการสังเคราะห์ผงบีตา – ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยการทำปฏิกิริยากันโดยตรงระหว่าง ผงโลหะซิลิกอนกับผงคาร์บอนแบล็ก



รูปที่ 3.6 เตาควบคุมบรรยากาศ รุ่น High-Multi 500 FV PHP-R-5 FRET-25



รูปที่ 3.7 กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ผงบีตา – ซิลิกอนคาร์ไบด์

สูตร	ชนิดขอ <mark>ง</mark>	<mark>อุณหภูมิ</mark>	<mark>อัตรา</mark> การเพิ่มอุณหภูมิ	เวลาในการ	บรรยากาศ
	คาร์บอน	(องศา	(องศาเซลเซียสต่อนาที)	รักษาอุณหภูมิ	ในการเผา
	/	<mark>เซลเซียส</mark>)	12:21	(ชั่วโมง)	
SC1V-1250-50-1	C1	1250	50	1	สุญญากาศ
SC2V-1250-50-1	C2	1250	50	1	สุญญากาศ
SC1V-1250-20-1	C1	1250	20	1	สุญญากาศ
SC1V-1250-20-3	C1	1250	20	3	สุญญากาศ
SC1V-1300-50-1	C1	1300	50	1	สุญญากาศ
SC1A-1300-50-1	C1	1300	50	1	อาร์กอน
SC2V-1300-50-1	C2	1300	50	S ¹	สุญญากาศ
SC1V-1300-20-1	C1	1300	20	d 1	สุญญากาศ
SC1V-1300-20-3	C1	1300	20	3	สุญญากาศ
SC1V-1350-50-1	C1	1350	50		สุญญากาศ
SC1A-1350-50-1	C1	1350	50	1	อาร์กอน
SC1V-1350-20-1	C1	1350	20	1	สุญญากาศ

ตารางที่ 3.2 ภาวะต่างๆ ที่ใช้สังเคราะห์ผงบีตา – ซิลิกอนคาร์ไบด์

3.4 การเตรียมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์จากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้

เลือกผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีสมบัติตามต้องการจากที่สังเคราะห์ได้ ในการศึกษาครั้งนี้เลือก มา 2 สูตร คือ SC1V-1350-50-1 และ SC1V-1300-50-1 นำมาเติมอะลูมินา (Al₂O₃) และอิทเทรีย (Y₂O₃) เพื่อช่วยในการซินเทอร์ โดยมีสัดส่วนของส่วนผสมดังตารางที่ 3.3

สูตร	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
	ผงซิลิกอนคา	Al_2O_3	Y ₂ O ₃			
	SC1V-1350-50-1	SC1V-1300-50-1				
SC135AY	90	-	6.25	3.75		
SC130AY	-	90	6.25	3.75		

ตารางที่ 3.3 สัดส่วนของส่วนผสมในการเตรียมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์

ขั้นตอนการเตรียมขึ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ แสดงดังรูปที่ 3.8 โดยชั่งน้ำหนักส่วนผสมแล้วนำ ไปบดผสมนาน 24 ชั่วโมง ใช้ขวดบดพอลิเอทิลีน ลูกบดซิลิกอนคาร์ไบด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และใช้เอทิลแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 เป็นตัวกลางในการบดผสม นำ ส่วนผสมหลังบดไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นแยกลูกบดออกแล้ว บดให้ละเอียดด้วยโกร่ง นำผงที่ได้ไปอัดขึ้นรูปขนาด 3 x 5 x 1 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิกที่ ความดัน 6 เมกะปาสคาล จากนั้นนำไปอัดโดยให้ความดันทุกทิศทางด้วยเครื่อง Cold Isostatic Press (CIP) ใช้ความดันประมาณ 200 เมกะปาสคาล แล้วนำไปซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1850 องศา-เซลเซียส โดยช่วงอุณหภูมิห้องถึง 1200 องศาเซลเซียส เป็นการซินเทอร์ในภาวะสุญญากาศ และ จาก 1200 องศาเซลเซียสถึงอุณหภูมิสูงสุดเป็นการซินเทอร์ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน อัตราการเพิ่ม อุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องถึง 1500 องศาเซลเซียส เท่ากับ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที หลังจากนั้นใช้ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที แล้วรักษาอุณหภูมิที่ 1850 องศาเซลเซียส เป็น เวลานาน 1 ชั่วโมง จึงค่อยลดอุณหภูมิลง กราฟการซินเทอร์แสดงดังรูปที่ 3.9 นำชิ้นงานที่เตรียมได้ มาตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ำหนักที่หายไป การหดตัว ความหนาแน่น ความพรุนตัว เป็นต้น ทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความทนแรงดัดโค้ง (bending strength) และ ความแข็ง (hardness) เป็นต้น และวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานด้วย



รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์



รูปที่ 3.9 กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการซินเทอร์ซิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ

4.1.1 การกระจายขนาดอนุภาค

ผลการวัดการกระจายขนาดอนุภาคของวัตถุดิบด้วยเครื่อง Centrifugal Particle Size Analyzer แสดงดังตารางที่ 4.1

ขนาดอนุภา <mark>ค</mark>	1	ปริมาณสะสม (ร้อยละ)					
(ไมโครเมตร)	ซิลิกอน	อะลูมินา	อิทเทรีย				
<50		-	-				
<40	100.00	-	-				
<30	91.75	100.00	-				
<20	76.05	98.30	100.00				
<15	60.90	96.70	95.00				
<10	44.35	93.60	85.00				
<8	35.70	91.50	78.50				
<6	26.80	87.00	61.50				
<5	21.85	87.00	46.60				
<4	16.20	87.00	31.60				
<3	12.10	85.40	18.00				
<2	8.30	82.40	8.20				
<1.5	5.45	82.20	7.00				
<1.0	2.80	76.60	3.90				
<0.8	2.60	67.50	-				
<0.6	2.15	47.80	-				
<0.5	1.90	32.80	-				
<0.4	1.70	18.40	-				
<0.3	-	9.10	-				

ตารางที่ 4.1 การกระจายขนาดอนุภาคของวัตถุดิบ

ผงซิลิกอน มีขนาดอนุภาคส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 8-30 ไมโครเมตร โดยมีขนาด อนุภาคเฉลี่ยที่ร้อยละ 50 (d₅₀) เป็น 12 ไมโครเมตร กราฟการกระจายขนาดของอนุภาคแสดง ดังรูปที่ 4.1 และ 4.2



รูปที่ 4.1 การกระจายขนาดอนุภาคของผงซิลิกอน



รูปที่ 4.2 การกระจายขนาดอนุภาคแบบสะสมของผงซิลิกอน

ผงอะลูมินา มีอนุภาคส่วนใหญ่ขนาดประมาณ 0.6 ไมโครเมตร โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ ร้อยละ 50 (d₅₀) เป็น 0.62 ไมโครเมตร กราฟการกระจายขนาดของอนุภาคแสดงดังรูปที่ 4.3 และ 4.4







รูปที่ 4.4 การกระจายขนาดอนุภาคแบบสะสมของผงอะลูมินา

ผงอิทเทรีย อนุภาคส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ 5 ไมโครเมตร โดยมีขนาดอนุภาค เฉลี่ยที่ร้อยละ 50 (d₅₀) เป็น 5.23 ไมโครเมตร กราฟการกระจายขนาดของอนุภาคแสดงดังรูปที่ 4.5 และ 4.6



รูปที่ 4.6 การกระจายขนาดอนุภาคแบบสะสมของผงอิทเทรีย

4.1.2 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัตถุดิบ

การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัตถุดิบ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) พบว่า ซิลิกอนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมแหลม คมเกาะกันเป็นก้อน มีทั้งอนุภาคขนาดเล็ก และใหญ่ผสมกันอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ขนาดอนุภาค ที่สังเกตได้จากภาพถ่าย คือ อนุภาคเล็กมีขนาดต่ำกว่า 5 ไมโครเมตร ส่วนอนุภาคใหญ่มีขนาดอยู่ ในช่วง 8-30 ไมโครเมตร ซึ่งสอดคล้องกับผลของการกระจายขนาดอนุภาคที่ได้กล่าวไปแล้ว



รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของซิลิกอน ที่กำลังขยาย 750 เท่า

จากภาพถ่าย SEM รูปที่ 4.8 ก) และ ข) ผงคาร์บอนแบล็ก-1 มีขนาดเกรนใหญ่กว่า คาร์บอนแบล็ก-2 โดยคาร์บอนแบล็ก-1 มีขนาดเกรนกระจายอยู่ในช่วง 10-50 ไมโครเมตร และ ขนาดเกรนของคาร์บอนแบล็ก-2 กระจายอยู่ในช่วงที่แคบกว่า คือ ระหว่าง 5-25 ไมโครเมตร อย่างไรก็ตาม ในเกรนของคาร์บอนแบล็กทั้งสองชนิด ประกอบด้วยคาร์บอนอนุภาคเล็กๆ หลาย อนุภาครวมกันอยู่



 ONT
 SOLUTION

 OKU
 XBOO

 OL
 SOLUTION

รูปที่ 4.8 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผงคาร์บอนแบล็ก ที่ กำลังขยาย 500 เท่า ก) คาร์บอนแบล็ก-1 ข) คาร์บอนแบล็ก-2

4.1.3 ลักษณะโครงสร้างผลึกของวัตถุดิบ

จากการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) ของผง ซิลิกอน ผงคาร์บอนแบล็กทั้งสองชนิด ผงอะลูมินา และผงอิทเทรีย พบพีกหลักที่มุมต่างๆ ดังแสดง ในกราฟ XRD รูปที่ 4.9-4.13

โครงสร้างผลึกของซิลิกอน สอดคล้องกับการ์ดมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 27-1402 ซึ่งมีค่า 20 ของ 3 พีกหลักที่ 28.44, 47.30 และ 56.12 องศา ซึ่งเป็นซิลิกอน ที่มีโครงสร้างผลึกเป็นคิวบิก กราฟ XRD ของผงซิลิกอน แสดงดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 กราฟ XRD ของผงซิลิกอน

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของคาร์บอนแบล็ก-1 พบว่า กราฟที่ได้เป็นลักษณะบรอดพีก ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งบรอดพีกครอบคลุมตำแหน่งของพีกแกรไฟต์ ที่มีโครงสร้างผลึกเป็น เฮกซะโกนอล สอดคล้องกับการ์ดมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 41-1487 แสดงว่าคาร์บอนแบล็ก-1 มี โครงสร้างผลึกที่ไม่สมบูรณ์ หรือกล่าวได้ว่าโครงสร้างผลึกอยู่ในรูปอสัณฐาน



รูปที่ 4.10 กราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-1

ส่วนกราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-2 แสดงดังรูปที่ 4.11 พบทั้งบรอดพีก และพีกปน กันอยู่ ตำแหน่งบรอดพีกครอบคลุมตำแหน่งของพีกแกรไฟต์ ตามการ์ดมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 41-1487 ที่มุม 20 เท่ากับ 26.38 องศา และพบพีกแกรไฟต์ที่มุม 20 เท่ากับ 44.39 และ 77.24 องศาด้วย แสดงว่า คาร์บอนแบล็ก-2 มีความเป็นผลึกมากกว่าคาร์บอนแบล็ก-1



รูปที่ 4.11 กราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-2

เมื่อนำผงอะลูมินา มาวิเคราะห์โครงสร้างผลึก พีกที่ได้เป็นดังรูปที่ 4.12 เมื่อนำไป เปรียบเทียบกับการ์ดมาตรฐาน JCPDS พบว่าตรงกับการ์ดมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 10-0173 ซึ่งเป็นแอลฟา-อะลูมินา ที่มีโครงสร้างผลึกเป็นรอมโบฮีดรอล



รูปที่ 4.12 กราฟ XRD ของผงอะลูมินา

โครงสร้างผลึกของผงอิทเทรีย มีโครงสร้างผลึกเป็นคิวบิก ซึ่งเป็นไปตามการ์ดมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 41-1105 ดังแสดงในรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 กราฟ XRD ของผงอิทเทรีย

4.1.4 พื้นที่ผิวของวัตถุดิบ

พื้นที่ผิวของผงซิลิกอน ผงคาร์บอนแบล็ก-1 และผงคาร์บอนแบล็ก-2 วัดโดยเครื่อง Surface Area Analyzer ผลการวัดแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่าพื้นที่ผิวของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก

สาร	พื้นที่ผิว (ตารางเมตรต่อกรัม)
ซิลิกอน	1.62
คาร์บอนแบล็ก-1	76.13
คาร์บอนแบล็ก-2	69.98

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่า ผงคาร์บอนแบล็ก-1 มีพื้นที่ผิวสูงกว่าผงคาร์บอนแบล็ก-2 โดย มีค่าเท่ากับ 76.13 ตารางเมตรต่อกรัม และ 69.98 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ผิวของ ซิลิกอนมีค่า 1.62 ตารางเมตรต่อกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนแบล็กทั้งสองชนิด พบว่า คาร์บอนแบล์ก-1 มีพื้นที่ผิวสูงกว่าซิลิกอนถึงประมาณ 47 เท่า ขณะที่คาร์บอนแบล์ก-2 มีพื้นที่ผิว สูงกว่าซิลิกอนประมาณ 43 เท่า

4.1.5 ความหนาแน่นของวัตถุดิบ

การตรวจวัดความหนาแน่นของผงซิลิกอน ผงคาร์บอนแบล็ก-1 และผงคาร์บอนแบล็ก-2 ใช้เครื่อง AccuPyc 1330 Pycnometer ผลแสดงดังตารางที่ 4.3

สาร	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)		
ซิลิกอน	2.42		
คาร์บ <mark>อนแบล็ก-1</mark>	2.05		
คาร์บอนแ <mark>บล็ก-2</mark>	1.97		

ตารางที่ 4.3 ความหนาแน่นของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก

้ผงซิลิกอนมีค่าความ<mark>หนาแน่นเท่ากับ 2.42 กรัมต่อลู</mark>กบาศก์เซนติเมตร ส่วนความ หนาแน่นของผงคาร์บอนแบล็กทั้งสองชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าผงซิลิกอนเพียงเล็กน้อย

4.1.6 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ

เมื่อนำวัตถุดิบมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง EDS ผลวิเคราะห์แสดงดัง ตารางที่ 4.4

ผลวิเคราะห์	สาร		
ทางเคมี			
(%)	ซิลิกอน	คาร์บอนแบล็ก-1	คาร์บอนแบล็ก-2
Si	97.35	0.13	-
Fe	0.44	-	-
Са	0.42		-
Al	1.20	- / /	-
Ti	0.11		-
Sn	0.49	-	-
С	-	98.53	98.63
0	- /	-	-
S	- //	1.34	1.37

ตารางที่ 4.4 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผงซิลิกอนมีปริมาณซิลิกอนสูงถึงร้อยละ 97 โดยมีเหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) อะลูมิเนียม (Al) ไททาเนียม (Ti) และดีบุก (Sn) เจือปนอยู่เล็กน้อย ส่วนคาร์บอน แบล็ก-1 และคาร์บอนแบล็ก-2 มีปริมาณคาร์บอนใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 99

4.1.7 ปริมาณออกซิเจนโดยรวม (Total Oxygen)

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนโดยรวมของผงซิลิกอน โดยเครื่อง Nitrogen/Oxygen Determinator (TC-436DR) พบว่า มีปริมาณออกซิเจนโดยรวมอยู่ในผง ซิลิกอนร้อยละ 2.54

"""""สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 ผลของตัวแปรต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ชิลิกอนคาร์ไบด์

4.2.1 ผลของชนิดสารละลายที่ใช้เป็นตัวกลางในการบดผสม

การทดลองบดผสมผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ อะซี-โตน เฮกเซน และเบนซีน พบว่าสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากการบดผสมในสารละลายทั้ง 4 ชนิด โดยเผาที่อุณหภูมิ และบรรยากาศเดียวกัน ให้ผลในทำนองเดียวกัน คือ ผลวิเคราะห์ XRD ให้ พีกที่เหมือนกัน สำหรับตัวอย่างที่เผาในสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส ด้วยอัตรา การเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง พบพีกของซิลิกอนคาร์ไบด์ เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเผาในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอนที่อุณหภูมิเดียวกัน พบพีกซิลิกอนปนอยู่ กับพีกของซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยความเช้มของพีกซิลิกอนของสารที่เตรียมจากสารละลายเบนซีน และอะซีโตน จะสูงกว่าความเช้มของพีกสำหรับสารที่เตรียมจากสารละลายเอกเซนและเอทิล-แอลกอฮอล์ รูปกราฟ XRD ของตัวอย่างที่ใช้สารละลายทั้ง 4 ชนิด เผาในสุญญากาศ แสดงดังรูปที่ 4.14 ส่วนที่เผาในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอน แสดงดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.14 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่ อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ในสุญญากาศ



รูปที่ 4.15 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสมในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่ อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน

ลักษณะโครงสร้างจุลภาคจากภาพถ่าย SEM ของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากการบด ผสมในสารละลายทั้ง 4 ชนิด ที่ภาวะการเผาเดียวกัน แสดงในรูปที่ 4.16 และ 4.17 พบว่า การใช้ เอทิลแอลกอฮอล์ อะซีโตน เอกเซน และเบนซีน เป็นตัวกลางในการบดผสม ไม่แสดงความแตกต่าง ของลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่เด่นชัด

ในการทดลองนี้พบว่าสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ อะซีโตน เฮกเซน และเบนซีน ไม่มีผล ต่อความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก เมื่อทำการสังเคราะห์ใน สุญญากาศ สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส แต่เมื่อทำการ สังเคราะห์ที่อุณหภูมิเดียวกันในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน เกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ พบพีกซิลิกอน อิสระร่วมกับพีกซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยในสารละลายเฮกเซน และเอทิลแอลกอฮอล์ พบปริมาณ ซิลิกอนอิสระเหลือน้อยกว่าในสารละลายเบนซีน และอะซีโตน ดังนั้นในการทดลองต่อไปจึงเลือก ใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารละลายในการบดผสม



TISTR SEI 15.0kV ×30,000 100nm H ค) থ)

รูปที่ 4.16 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสม ในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ในภาวะสุญญากาศ

ก) บดผสมในเอทิลแอลกอฮอล์

ข) บดผสมในอะซีโตน ค) บดผสมในเฮกเซน 🥏 📃 ง) บดผสมในเบนซีน





รูปที่ 4.17 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บดผสม ในสารละลายต่างชนิดกัน เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ก) บดผสมในเอทิลแอลกอฮอล์ ข) บดผสมในอะซีโตน

- ก) บดผลม เนเอทลแอลกอออล ข) บด
- ค) บดผสมในเฮกเซน

บดผสมในอะซีโตน
 บดผสมในเบนซีน

4.2.2 ผลของชนิดคาร์บอนต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากคาร์บอนแบล็ก-1 (C1) และคาร์บอนแบล็ก-2 (C2) ตามลำดับ บดผสมกับผงซิลิกอนในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ เผาในภาวะสุญญากาศ ที่ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส และ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ใช้อัตราการเพิ่ม อุณหภูมิเท่ากับ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที มีผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนและคาร์บอนอิสระ และ ความหนาแน่นแสดงในตารางที่ 4.5 และผลวิเคราะห์ XRD แสดงดังรูปที่ 4.18

สูตร	คาร์บอน	อุณหภูมิ	ซิลิกอน	คาร์บอน	ความหนาแน่น
	แบล็กที่ใช้	(องศาเซลเซียส)	อิสระ	อิสระ	(กรัมต่อลูกบาศก์
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	เซนติเมตร)
SC1V-1250-50-1	C1	1250	6.464	0.085	2.95
SC2V-1250-50-1	C2	1250	7.208	0.086	2.93
SC1V-1300-50-1	C1	1300	1.235	0.108	3.02
SC2V-1300-50-1	C2	1300	2.961	0.089	3.04

ตารางที่ 4.5 ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ และความหนาแน่น ของผง บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เตรียมจากคาร์บอนแบล็กต่างชนิดกัน

จากตารางที่ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณร้อยละของซิลิกอนอิสระ และคาร์บอนอิสระ ที่เหลืออยู่ในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่สังเคราะห์จากผงคาร์บอนแบล็กทั้งสองชนิด พบว่า ้ เริ่มาณซิลิกคนคิสระในผงบีตา-ซิลิกคนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงคาร์บคนแบล็ก-1 มีเริ่มาณต่ำกว่า ที่พบในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงคาร์บอนแบล็ก-2 ซึ่งสอดคล้องกับผล X-ray diffraction ดังแสดงในรูปที่ 4.18 คือ ความเข้มของพีกซิลิกอนที่พบในตัวอย่างที่เตรียมจาก คาร์บอนแบล็ก-2 มีค่ามากกว่าพีกซิลิกอนที่พบในตัวอย่างที่เตรียมจากคาร์บอนแบล็ก-1 ดังนั้น ้ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จากผงคาร์บอนแบล็<mark>ก</mark>-1 มีความบริสุทธิ์สูงกว่าผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จากผงคาร์บอนแบล็ก-2 เนื่องจากพื้นที่ผิวของผงคาร์บอนแบล็ก-1 มีค่าสูงกว่าผงคาร์บอนแบล็ก-2 คือ 76.13 และ 69.98 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ ทำให้อัตรา การเกิดปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก-1 มีค่าสูงกว่า เพราะอัตราการเกิดปฏิกิริยา ขึ้นกับพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของผลึกมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา เช่นกัน จากรูปที่ 4.10 และ 4.11 แสดงกราฟ XRD ของผงคาร์บอนแบล็ก-1 และคาร์บอนแบล็ก-2 ตามลำดับ ซึ่งคาร์บอนแบล็ก-1 แสดงความเป็นอสัณฐาน หรือมีความเป็นผลึกที่ไม่สมบูรณ์ มากกว่าคาร์บอนแบล็ก-2 ดังนั้น การทำปฏิกิริยาระหว่างผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก-1 จะ สมบูรณ์ มากกว่าคาร์บอนแบล็ก-2 ที่มีความเป็นผลึกสูงกว่า ส่วนปริมาณคาร์บอนอิสระในผง ้บีตา-ซิลิกคน คาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงคาร์บคนแบล็กทั้งสองชนิด มีค่าใกล้เคียงกัน

ค่าความหนาแน่นของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อใช้คาร์บอนแบล็ก-1 กับคาร์บอนแบล็ก-2 ที่อุณหภูมิเดียวกัน และบรรยากาศการเผาเหมือนกัน คือ มีค่า 2.95 และ 2.93 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับตัวอย่างที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศา- เซลเซียส และสำหรับตัวอย่างที่เผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส มีค่า 3.02 และ 3.04 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ



รูปที่ 4.18 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากผงคาร์บอนแบล็ก-1 และผง คาร์บอนแบล็ก-2 เผาในสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่ม อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง

จากผลวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นว่าคาร์บอนแบล็ก-1 มีแนวโน้มที่ทำปฏิกิริยากับผงซิลิกอน ได้ดีกว่าคาร์บอนแบล็ก-2 ดังนั้นจึงเลือกใช้คาร์บอนแบล็ก-1 ในการทดลองต่อไป

4.2.3 ผลของบรรยากาศการเผาต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

ทดลองสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยใช้ผงซิลิกอนบดผสมกับคาร์บอนแบล็ก-1 ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ เผาที่อุณหภูมิ 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ เท่ากับ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เปรียบเทียบผลที่เผาใน บรรยากาศแก๊สอาร์กอนและสุญญากาศ พบว่าผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาใน สุญญากาศ มีปริมาณซิลิกอนอิสระเหลืออยู่น้อยกว่าในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาใน บรรยากาศแก๊สอาร์กอน สำหรับปริมาณคาร์บอนอิสระของตัวอย่างที่เตรียมจากทั้งสองบรรยากาศ มีค่าใกล้เคียงกัน และผงที่ได้จากการเผาในสุญญากาศ มีการสูญเสียน้ำหนักมากกว่าผงที่เผาใน บรรยากาศแก๊สอาร์กอน ผลแสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ และน้ำหนักที่หายไปของผง บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เผาในสุญญากาศ และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน

สูตร	บรรยากาศ <mark>การเผา</mark>	ซิลิกอนอิสระ	คาร์บอนอิสระ	น้ำหนักที่หายไป
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
SC1V-1300-50-1	สุญญากาศ	1.235	0.108	2.71
SC1A-1300-50-1	แก๊สอาร์กอน	5.190	0.086	0.998
SC1V-1350-50-1	สุญญากาศ	0.106	0.141	เม็ดงานแตก
SC1A-1350-50-1	แก๊สอาร์กอน	0.347	0.075	เม็ดงานแตก

ผล XRD ของผงปีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในทั้งสองบรรยากาศแสดงในรูปที่ 4.19 ผง บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในสุญญากาศ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แสดง ความเข้มของพีกซิลิกอนอิสระน้อยกว่าในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในบรรยากาศอาร์กอนที่ อุณหภูมิเดียวกัน สำหรับอุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส ไม่พบพีกซิลิกอนอิสระในผงบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่เผาในสุญญากาศ แต่ยังคงพบในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในบรรยากาศแก๊ส อาร์กอน โดยความเข้มของพีกไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.19 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิและบรรยากาศต่างๆ กัน

- ก) 1300 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ
- ข) 1300 องศาเซลเซียส ในแก๊สอาร์กอน
- ค) 1350 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ
- ง) 1350 องศาเซลเซียส ในแก๊สอาร์กอน

จากผลการวัดปริมาณซิลิกอนอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอน และคาร์บอนแบล็กในสุญญากาศ เกิดได้ดีกว่าใน บรรยากาศแก๊สอาร์กอน ที่อุณหภูมิและเวลาในการเผาที่เท่ากัน ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุเนื่องมาจาก สารตั้งต้นทั้งซิลิกอนและคาร์บอนแบล็กไม่ได้ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นสารซิลิกอนคาร์ไบด์ในทันที แต่ซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ผิวของอนุภาคซิลิกอน และคาร์บอน แบล็ก หรือออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่ในเตาที่ภาวะสุญญากาศ เกิดเป็นแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ (SiO) และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รอบๆ อนุภาคซิลิกอน และคาร์บอนแบล็ก แก๊สซิลิกอน มอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแพร่เข้าไปในอนุภาคของคาร์บอนแบล็ก เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบ ซิลิกอนคาร์ไบด์ แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาทั้ง 2 สภาวะร่วมกันระหว่าง solid-solid reaction และ gas-solid reaction ดังสมการเคมีที่ 4.1 ถึง 4.4^[40]

Si	+ 1/20 _{2 (g)}	= SiO (g)	ΔG = -60 kcal	(4.1)
С	+ 1/20 _{2 (g)}	= CO (g)	$\Delta G = -65$ kcal	(4.2)
Si	+ 3C + SiO $_{(g)}$	= $2SiC + CO_{(g)}$	ΔG = -36 kcal	(4.3)
Si	+ C	= SiC	$\Delta G = -17$ kcal	(4.4)

สมการที่ 4.3 เป็นการเกิดปฏิกิริยาแบบ solid-solid reaction ร่วมกับ gas-solid reaction มีค่าพลังงานอิสระของกิบส์ (ΔG) ที่อุณหภูมิห้อง เท่ากับ –36 กิโลแคลอรี ซึ่งต่ำกว่าสมการที่ 4.4 ที่มีค่าพลังงานอิสระของกิบส์ที่อุณหภูมิห้อง เท่ากับ –17 กิโลแคลอรี และเป็นการเกิดปฏิกิริยา แบบ solid-solid reaction อย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าการเกิดปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอน และ คาร์บอนแบล็กในระบบที่มีปฏิกิริยาทั้ง 2 สภาวะร่วมกัน คือ solid-solid และ gas-solid เกิดได้ดี กว่าในสภาวะที่เป็น solid-solid อย่างเดียว ดังนั้นสมการที่ 4.3 จัดเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลัก สำหรับการทดลองนี้ในภาวะสุญญากาศ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่ล้อมรอบอนุภาคคาร์บอน แบล็ก จะถูกดูดออกจากระบบ เพื่อให้แก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ และอนุภาคซิลิกอนสัมผัสกับ คาร์บอนแบล็ก เกิดเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ ทำให้ปฏิกิริยาเกิดไปทางขวาได้มากขึ้น ดังนั้น จึงพบ ปริมาณซิลิกอนอิสระน้อยกว่าในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ซึ่งแก๊ส คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ถูกดูดออกจากระบบ ไปขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส ซิลิกอนมอนอกไซด์กับคาร์บอนแบล็ก และซิลิกอนกับคาร์บอนแบล์ก ปฏิกิริยาเกิดไปทางขวาได้ น้อยกว่า ทำให้ปริมาณซิลิกอนอิสระเหลือปะปนอยู่ในผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์มากกว่า

4.2.4 ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการผสมผงซิลิกอนกับคาร์บอนแบล็ก-1 เผาในภาวะ สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ เท่ากับ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที รักษาอุณหภูมิสูงสุดนาน 1 ชั่วโมง ทำการวิเคราะห์สมบัติของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ผลวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.7
สูตร	ซิลิกอนอิสระ (ร้อยละ)	คาร์บอนอิสระ (ร้อยละ)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)	น้ำหนักที่หายไป (ร้อยละ)
SC1V-1250-50-1	6.464	0.085	2.95	2.48
SC1V-1300-50-1	1.235	0.108	3.02	2.71
SC1V-1350-50-1	0.106	0.141	3.10	เม็ดงานแตก

ตารางที่ 4.7 ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนักที่ หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิต่างๆ

จากตารางที่ 4.7 พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณซิลิกอนอิสระที่เหลืออยู่ในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ น้อยลงตามลำดับ คือ ร้อยละ 6.464 1.235 และ 0.106 สำหรับ อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 ตามลำดับ พบคาร์บอนอิสระในปริมาณน้อย คือ ต่ำกว่าร้อยละ 0.2 ในทุกอุณหภูมิ สำหรับค่าความหนาแน่น แสดงความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น เล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิการสังเคราะห์สูงขึ้น และมีค่าการสูญเสียน้ำหนักมากขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จาก 1250 เป็น 1300 องศาเซลเซียส ร้อยละของน้ำหนักที่หายไปมีค่าเท่ากับ 2.48 และ 2.71 ตามลำดับ และที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เม็ดงาน (pellet) แตกหลังเผา ไม่สามารถหาค่า น้ำหนักที่หายไปได้ แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิสูงปริมาณแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ และแก๊ส คาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากขึ้น และมากพอจนทำให้เม็ดงานแตกที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นการยืนยันว่าปฏิกิริยาระหว่างชิลิกอน และคาร์บอนแบล์กในการทดลองนี้ เป็นปฏิกิริยาร่วมระหว่าง solid-solid reaction และ gas-solid reaction ดังสมการที่ 4.3 ที่กล่าว ไว้ในหัวข้อ 4.2.3 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาระสมบูรณ์มากขึ้น โดยเกิดไปทางขวามากขึ้น สารบัตา-ซิลิกอนควร์ไบด์ที่ได้จากปฏิกิริยามีความบริสุทธิ์มากขึ้น ปริมาณซิลิกอนอิสระที่เหลือจาก ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกว่า มีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด และความหนาแน่นของผงบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ มีค่ามากขึ้น

ผลวิเคราะห์ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมได้จากการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ แสดงดังรูปที่ 4.20 พบพีกบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ และมีพีกซิลิกอนปนอยู่ด้วย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความสูงของพีกร้อยละ 100 ของบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ซึ่งตรงกับมุม 20 เท่ากับ 35.6 องศา จะสูงขึ้น ในขณะที่ความสูงของพีกร้อยละ 100 ของซิลิกอน ซึ่งตรงกับมุม 20 เท่ากับ 28.5 องศา ลดลงตามลำดับ และไม่พบพีกซิลิกอนเลย เมื่อเผาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เนื่องจากปริมาณซิลิกอนอิสระเหลืออยู่น้อยจนไม่ สามารถวัดได้จากเครื่อง X-ray diffractometer และที่ทั้ง 3 อุณหภูมิไม่พบพีกของคาร์บอนอิสระ ปรากฏอยู่ เนื่องจากคาร์บอนที่เหลืออยู่จากปฏิกิริยามีปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดโดย เครื่อง X-ray diffractometer ได้ นอกจากนี้คาร์บอนแบล็กที่ใช้เป็นสารตั้งต้นอยู่ในรูปของ อสัณฐาน ซึ่งไม่แสดงพีก ผลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.21 แสดงปริมาณของซิลิกอนอิสระที่อุณหภูมิต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างการสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่เผาในสุญญากาศ และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ปริมาณซิลิกอนอิสระจะแปรผกผันกับ อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณซิลิกอนอิสระลดลง ในทั้งสองบรรยากาศ แต่ปริมาณซิลิกอน อิสระในตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่บรรยากาศแก๊สอาร์กอน มีค่าสูงกว่าที่สังเคราะห์ในสุญญากาศ อย่างไรก็ตาม ค่าความแตกต่างของปริมาณซิลิกอนอิสระในตัวอย่างที่เผาในบรรยากาศแก๊ส อาร์กอนและสุญญากาศ มีค่าน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องมาจากที่อุณหภูมิสูงปริมาณแก๊ส ซิลิกอนมอนอกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดขึ้นมาก และพยายามเคลื่อนตัวออกจากเม็ด pellet แรงดันของแก๊สดังกล่าวมีมากจนถึงจุดหนึ่งที่เม็ด pellet เกิดการแตก ขณะที่แก๊สมีการ เคลื่อนตัวออกจากเม็ด pellet มาก ปฏิกิริยาระหว่างเนื้อ pellet ก็มากขึ้นด้วย ปริมาณซิลิกอน อิสระที่เหลือจากปฏิกิริยาจึงมีค่าลดลง



2-Theta (Degree)

รูปที่ 4.20 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากการเผาด้วยอัตราการเพิ่ม อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ในสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.21 กราฟแสดงปริมาณของซิลิกอนอิสระในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เผาใน สุญญากาศ และบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่างๆ

ลักษณะโครงสร้างจุลภาคจากภาพถ่าย FE-SEM ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ ที่อุณหภูมิ 1250 และ 1350 องศาเซลเซียส มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ประกอบด้วยอนุภาคขนาด เล็กต่ำกว่า 100 นาโนเมตร เกาะกันเป็นกลุ่มๆ ขนาดอนุภาคมีการกระจายตัวอยู่ในช่วงที่แคบ และ อนุภาคมีรูปร่างเป็นทรงกลม ดังแสดงในรูปที่ 4.22

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ก)



รูปที่ 4.22 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์จากการเผาในสุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่างกัน

- ก) 1250 อง<mark>ศ</mark>าเซลเซียส
- ข) 1350 องศาเซลเซียส

4.2.5 ผลของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1250 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ถูกนำมาวิเคราะห์สมบัติเปรียบเทียบกัน พบว่า การเปลี่ยนอัตราการเพิ่มอุณหภูมิให้ช้าลง จากเดิม 50 องศาเซลเซียสต่อนาที มาเป็น 20 องศาเซลเซียสต่อนาที มีผลต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยาค่อนข้างสูงที่อุณหภูมิต่ำ (1250 องศาเซลเซียส) แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเพิ่ม อุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาน้อยลง จากตารางที่ 4.8 แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอน อิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนักที่หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่ อุณหภูมิ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่างๆ กัน จะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ผง บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมได้ มีปริมาณซิลิกอนเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจาก 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็น 20 องศาเซลเซียสต่อนาที โดยมีค่าร้อยละ 6.464 และ 11.180 ตามลำดับ ขณะที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละ 1.235 และ 1.719 และที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส มีชิลิกอนอิสระเหลืออยู่ปริมาณใกล้เคียงกัน คือ มีค่าร้อยละ 0.106 และ 0.111 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.8 ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนัก ที่หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิ และอัตราการเพิ่ม อุณหภูมิต่างๆ กัน

สูตร	ซิลิกอน อิสระ (ร้อยละ)	คาร์บอน อิสระ (ร้อยละ)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร)	น้ำหนักที่หายไป (ร้อยละ)
SC1V-1250-50-1	6.464	0.085	2.95	2.48
SC1V-1250-20-1	11.180	0.070	2.85	1.66
SC1V-1300-50-1	1.235	0.108	3.02	2.71
SC1V-1300-20-1	1.719	0.077	3.04	2.54
SC1V-1350-50-1	0.106	0.141	3.10	เม็ดงานแตก
SC1V-1350-20-1	0.111	0.177	3.19	เม็ดงานแตก

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.23 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากการเผาในสุญญากาศ นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่างๆ กัน ก) 1300 องศาเซลเซียส, 50 องศาเซลเซียสต่อนาที ข) 1300 องศาเซลเซียส, 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ค) 1250 องศาเซลเซียส, 50 องศาเซลเซียสต่อนาที ง) 1250 องศาเซลเซียส, 20 องศาเซลเซียสต่อนาที

ผล X-ray diffraction ดังแสดงในรูปที่ 4.23 พบว่า ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เผาที่ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที แสดงพีกความ เข้มของซิลิกอนต่ำกว่าพีกความเข้มของซิลิกอนที่พบในผงบีตา-ซิลิกอนคารไบด์ที่เผาที่อุณหภูมิ เดียวกัน แต่ลดอัตราการเพิ่มอุณหภูมิเป็น 20 องศาเซลเซียสต่อนาที แสดงให้เห็นว่าปริมาณ ซิลิกอนเพิ่มขึ้น เมื่อใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิในการสังเคราะห์ให้ช้าลงสำหรับอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ความเข้มของพีกซิลิกอน มีค่าใกล้เคียงกัน ที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองใน ตารางที่ 4.8



รูปที่ 4.24 กราฟแสดงปริมาณของซิลิกอนอิสระในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ อุณหภูมิต่างๆ ในภาวะสุญญากาศ นาน 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า อัตราการเพิ่มอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ อุณหภูมิการสังเคราะห์ต่ำมากกว่าที่อุณหภูมิการสังเคราะห์สูง ดังกราฟรูปที่ 4.24 ซึ่งแสดงความ แตกต่างของปริมาณซิลิกอนอิสระที่อุณหภูมิ 1250 มากกว่าที่อุณหภูมิ 1300 และ 1350 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อเผาในบรรยากาศเดียวกัน โดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิช้า เกิดปฏิกิริยาช้า หรือเกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์มากกว่า จึงพบซิลิกอนอิสระปนอยู่ในสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ในปริมาณมากกว่า และมีการสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่า เนื่องจากแก๊สซิลิกอน-มอนอกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยามีปริมาณน้อยกว่าที่อุณหภูมิการ สังเคราะห์นั้น เนื่องจากถูกใช้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา gas-solid (SiO-C) ในระหว่างการเพิ่มของ อุณหภูมิ และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เกิดปฏิกิริยา แก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์หมดไป จึงเหลือ แต่ปฏิกิริยาระหว่าง solid-solid (Si-C) ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากกว่ากรณีที่มี 2 ปฏิกิริยาร่วมกัน ในขณะที่ การเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิที่ทำการสังเคราะห์ ยังคงมีแก๊สซิลิกอนมอนอกไซด์ เหลืออยู่ เพื่อทำปฏิกิริยาเกิดเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ ร่วมกับปฏิกิริยาระหว่าง Si-C ในสภาวะ solidsolid reaction สำหรับผลการวัดปริมาณคาร์บอนอิสระในสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ และความหนาแน่น โดยเปรียบเทียบค่าที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 และ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่อุณหภูมิและ เวลาในการเผาเท่ากัน พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.8 ส่วนลักษณะโครงสร้าง จุลภาคของตัวอย่างที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิทั้งสองค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.25 แสดงให้ เห็นว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิไม่มีผลอย่างเด่นซัดต่อปริมาณคาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และ ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ที่ภาวะการเผาเดียวกัน



ก)



รูปที่ 4.25 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ 1300 องศาเซลเซียส ในสุญญากาศ นาน 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการ เพิ่มอุณหภูมิต่างกัน

ก) 50 องศาเซลเซียสต่อนาที

ข) 20 องศาเซลเซียสต่อนาที

4.2.6 ผลของเวลาต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

นำผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ใน สุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง มาวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ผลแสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ผลวิเคราะห์ปริมาณซิลิกอนอิสระ คาร์บอนอิสระ ความหนาแน่น และน้ำหนัก ที่หายไปของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เผาที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศา-เซลเซียส ในสุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 และ 3 ชั่วโมง

สูตร	ซิลิกอน อิสระ (ร้อยละ)	คาร์บอน อิสระ (ร้อยละ)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร)	น้ำหนักที่หายไป (ร้อยละ)
SC1V-1250-20-1	<mark>11.180</mark>	0.070	2.85	1.66
SC1V-1250-20-3	3.835	0.073	2.99	2.54
SC1V-1300-20-1	1 .719	0.077	3.04	2.54
SC1V-1300-20-3	1. <mark>10</mark> 0	0.104	3.08	3.62

เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการรักษาอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 1 ชั่วโมง กับ 3 ชั่วโมง พบว่า ที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการรักษาอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงสุดมี ผลต่อความบริสุทธิ์ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้น้อย จะเห็นได้ว่าปริมาณซิลิกอน อิสระที่หลงเหลืออยู่ในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ มีปริมาณไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ปริมาณ ซิลิกอนอิสระมีความแตกต่างกันมากที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส คือ เมื่อเพิ่มเวลาในการเผา จาก 1 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ปริมาณซิลิกอนอิสระที่หลงเหลืออยู่ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 11.180 เหลือร้อยละ 3.835 ตามลำดับ ปริมาณคาร์บอนอิสระ และค่าความหนาแน่น มีค่าเพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย ที่การรักษาเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดนานขึ้น ส่วนร้อยละของน้ำหนักที่หายไปจะเพิ่มขึ้น เมื่อการรักษาเวลาการเผาที่อุณหภูมิสูงสุดนานขึ้น สำหรับทั้งสองอุณหภูมิ



รูปที่ 4.26 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ 1250 องศาเซลเซียส ใน สุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ระยะเวลา ในการรักษาอุณหภูมิต่างกัน ก) 3 ชั่วโมง ข) 1 ชั่วโมง



รูปที่ 4.27 กราฟ XRD ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ สังเคราะห์ที่ 1300 องศาเซลเซียส ใน สุญญากาศ ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ระยะเวลา ในการรักษาอุณหภูมิต่างกัน ก) 3 ชั่วโมง ข) 1 ชั่วโมง

รูปที่ 4.26 และ 4.27 แสดงกราฟ X-ray diffraction ของตัวอย่างที่ผ่านการเผาที่ อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พบว่าความเข้มของพีกซิลิกอนลดลง เมื่อ รักษาเวลาในการเผาที่อุณหภูมิสูงสุดนานขึ้นจาก 1 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ของทั้งสองอุณหภูมิ โดย ที่อุณหภูมิต่ำกว่า คือ 1250 องศาเซลเซียส แสดงค่าความแตกต่างของความเข้มพีกมากกว่าที่ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณซิลิกอนอิสระ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 อธิบายได้ว่าที่เวลานานขึ้นปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์มากขึ้น ปฏิกิริยาระหว่าง gas-solid เกิดมากใน ช่วงแรกของเวลา และจะหมดไปเนื่องจากปฏิกิริยาถูกควบคุมด้วยปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ใน ระบบ ดังนั้นในช่วงเวลาที่นานขึ้นปฏิกิริยาจะเป็น solid-solid (Si-C) เด่นกว่า ซึ่งใช้คาร์บอนแบล็ก ในการทำปฏิกิริยาน้อยกว่า จึงมีซิลิกอนอิสระเหลือจากปฏิกิริยา

4.3 ผลการเปรียบเทียบผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้กับท้องตลาด

จากผลการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการสังเคราะห์ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ในหัวข้อ 4.2 พบว่า การใช้ผงซิลิกอนผสมกับผงคาร์บอนแบล็ก-1 และทำการเผาที่อุณหภูมิ 1350 องศา-เซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ในสุญญากาศ จะได้ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะอื่นๆ เมื่อลด อุณหภูมิการเผาเป็น 1300 องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ เหมือนกัน พบปริมาณซิลิกอนอิสระ เหลือในผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลวิเคราะห์ของสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ สังเคราะห์ได้ทั้งสองอุณหภูมิ ถูกแสดงเปรียบเทียบกับผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ของท้องตลาด ดังตารางที่ 4.10

ตัวอย่างผง ซิลิกอนคาร์ไบด์	ซิลิกอนอิสระ (ร้อยละ)	คาร์บอนอิสระ (ร้อยละ)	พื้นที่ผิว จำเพาะ (ตารางเมตร	โท	ธาตุอ ('	งค์ประเ ร้อยละ)	กอบ	
9			ต่อกรัม)	Si	Sn	AI	S	Fe
Betarundum								
(ท้องตลาด)	0.048	0.068	18.03	98.75	0.81	0.34	0.09	0
SC1V-1350-50-1	0.106	0.141	19.75	93.91	2.36	2.23	0.54	0.95
SC1V-1300-50-1	1.235	0.108	22.36	93.95	2.67	2.27	0.33	0.78

ตารางที่ 4.10 สมบัติของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้กับท้องตลาด



ก)



รูปที่ 4.28 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่กำลังขยาย 30,000 เท่า ก) betarundum ข) SC1V-1350-50-1

จากตารางที่ 4.10 ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ จากทั้ง สองอุณหภูมิและจากท้องตลาด (betarundum) มีค่าใกล้เคียงกันโดยผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ สังเคราะห์ได้มีค่าสูงกว่าเล็กน้อย แต่ลักษณะการกระจายขนาดอนุภาคแตกต่างกัน ดังแสดงใน รูปที่ 4.28 จากภาพถ่าย FE-SEM พบว่า ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการสังเคราะห์มีขนาด เล็กมากอยู่ในช่วง 10-100 นาโนเมตร และมีขนาดอนุภาคกระจายสม่ำเสมอ หรือกระจายในช่วง ที่แคบ สำหรับผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากท้องตลาดประกอบด้วยอนุภาคที่มีการกระจาย 2 ช่วง ขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 0.5-1 ไมครอน และอนุภาคขนาดเล็กอยู่ในช่วง 10-100 นาโนเมตร

ผลวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ ด้วยเครื่อง Energy dispersive spectroscopy (EDS) พบว่า ผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ มีสารเจือปนมากกว่าผงซิลิกอนคาร์ไบด์จากท้องตลาด ปริมาณธาตุซิลิกอนที่ตรวจพบในตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ มีค่าเท่ากับร้อยละ 93.9 ซึ่งต่ำกว่าของ ท้องตลาด ที่วัดได้เท่ากับร้อยละ 98.75 และปริมาณซิลิกอนอิสระในผงซิลิกอนคาร์ไบด์จาก ท้องตลาด มีค่าต่ำกว่าในผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ขาย ในท้องตลาด มีการนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางเคมี เพื่อกำจัดสารเจือปนต่างๆ ออกไป หลังจากผ่านกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเป็นสารซิลิกอนคาร์ไบด์ อย่างไรก็ตาม ขนาด อนุภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร ถ้านำมาผ่าน กระบวนการกำจัดสารเจือปน จะได้สารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงทัดเทียมท้องตลาดได้

4.4 ผลวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของชิ้นงานที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้

ทดลองนำผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ สูตร SC1V-1350-50-1 และ SC1V-1300-50-1 บดผสมกับสารตัวเติมอะลูมินาร้อยละ 6.25 และอิทเทรียร้อยละ 3.75 ใช้ชื่อสูตรเป็น SC135AY และ SC130AY ตามลำดับ ทำการซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอน นำชิ้นงานที่ได้มาวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางกล และลักษณะโครงสร้างจุลภาค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11 และ 4.12 และรูปที่ 4.29 ตามลำดับ

	ตารางที่ 4.11	สมบัติทางเ	กายภาพของร์	ชิ้นงานซิลิกอเ	เคาร์ไบด์ทีเติม	อะลูมินา-อิท	เทรีย ห	ลังซินเทอร์
ที่ 1850 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน		ที่ 1850 อง	งศาเซลเซียส เ	นาน 1 ชั่วโมง	ในบรรยากาศเ	เก๊สอาร์กอน	,	

สมบัติ	SC135AY	SC130AY
น้ำหนักที่หายไป (ร้อยละ)	3.22	4.66
การหดตัว (ร้อยละ)	17.87	0 16.77
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)	88.96	79.50
ความพรุนตัว (ร้อยละ)	13.38	26.30

สมบัติ	SC135AY	SC130AY
ความทนแรงดัดโค้ง (เมกะปาสคาล)	131	118
ความแข็ง (HV; เมกะปาสคาล)	745	269

ตารางที่ 4.12 สมบัติทางกลของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เติมอะลูมินา-อิทเทรีย หลังซินเทอร์ที่ 1850 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน

้จากตารางที่ 4.11 จะเห็นว่าร้อยละของการหดตัวของตัวอย่าง SC135AY และ SC130AY มีค่าร้อยละ 17.87 และ 16.77 ตามลำดับ ความหนาแน่นสัมพัทธ์มีค่าร้อยละ 88.96 และ 79.50 ตามลำดับ และชิ้นงาน SC130AY มีการสูญเสียน้ำหนักมากกว่าชิ้นงานที่เตรียมจากผงซิลิกอน คาร์ไบด์สูตร SC1V-1350-50-1 จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานที่ได้ยังมีความ พรุนตัวสูงโดย SC135AY มีความพรุนตัวร้อยละ 13.38 และชิ้นงาน SC130AY ซึ่งเตรียมจากผง ชิลิกอนคาร์ไบด์สูตร SC1V-1300-50-1 ซึ่งมีปริมาณซิลิกอนอิสระมากกว่า มีความพรุนตัวร้อยละ 26.30 ซึ่งสูงกว่าสูตรแรกเป็นเท่าตัว ผลของค่าความพรุนตัวและความหนาแน่นของชิ้นงาน สอดคล้องกับสมบัติเชิงกล อาทิเช่น ค่าความทนแรงดัดโค้ง และค่าความแข็งของชิ้นงาน ดังแสดง ในตารางที่ 4.12 พบว่าการใช้สารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณซิลิกอนอิสระเหลืออยู่มากเป็น สารตั้งต้น จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงต่ำ เนื่องจากซิลิกอนไปลดอัตราการซินเทอร์ของสาร ซิลิกอนคาร์ไบด์ อะลูมินา และอิทเท<mark>รีย โดยปกติแล้วการ</mark>เติมอะลูมินา และอิทเทรีย จะช่วยลด อุณหภูมิการซินเทอร์ของซิลิกอนคาร์ไบด์จาก 2000 องศาเซลเซียส ให้มาอยู่ที่ 1900 หรือ 1850 องศาเซลเซียส เพราะสารตัวเติมอะลูมินา และอิทเทรียจะเกิดเป็น liquid phase ช่วยในการ ชินเทอร์ อย่างไรก็ตาม ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้จากการทดลองนี้ ถึงแม้จะมีอนุภาคขนาด เล็กในระดับนาโนเมตร แต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนกำจัดสารเจือปน เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ ทำให้ ้ชิ้นงานที่เตรียมได้ มีความหนาแน่นต่ำ สารตัวเติมอะลูมินา และอิทเทรีย ไม่สามารถสร้าง liquid phase ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อช่วยในการซินเทอร์ได้ ดังภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน ที่เตรียมจากสารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ดังรูปที่ 4.29 แสดงให้เห็นถึงรูพรุนจำนวนมากใน เนื้อชิ้นงาน โดยรูพรุนมีจำนวนมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้นในชิ้นงานที่เตรียมจากสารซิลิกอน คาร์ไบด์ที่มีปริมาณซิลิกอนอิสระมากกว่า



ก)



ป)

รูปที่ 4.29 ภาพถ่ายจาก SEM ที่กำลังขยาย 1,000 เท่า ของลักษณะพื้นผิวชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เติมอะลูมินา และอิทเทรีย ขึ้นรูปโดยผ่าน CIP ที่ความดัน 200 เมกะปาสคาล ซินเทอร์ที่ 1850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ก) SC135AY ข) SC130AY

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการทดลอง

การใช้ผงโลหะซิลิกอนบดผสมกับผงคาร์บอนแบล็ก แล้วนำไปเผาที่ภาวะต่างๆ สามารถ สังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนได้ โดยตัวแปรต่างๆ เช่น ชนิดของคาร์บอน แบล็กที่ใช้ บรรยากาศในการเผา อุณหภูมิ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา อุณหภูมิสูงสุด เป็นต้น ล้วนแต่มีบทบาทต่อสมบัติของผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ อะซีโตน เฮกเซน และเบนซีน เป็นตัวกลางในการบดผสม ไม่แสดง ความแตกต่างที่ชัดเจนของสมบัติผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้
- ขนาดพื้นที่ผิว และความเป็นผลึกของผงคาร์บอนแบล็ก มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง ซิลิกอน และคาร์บอน คาร์บอนแบล็กที่มีพื้นที่ผิวมาก และมีความเป็นผลึกน้อยกว่า จะเกิด ปฏิกิริยาที่สมบูรณ์มากกว่า
- บรรยากาศการเผา มีผลต่อปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ จากสารตั้งต้น ซิลิกอน และคาร์บอนแบล็ก โดยปฏิกิริยาเกิดได้ดีในสุญญากาศมากกว่าในบรรยากาศของ แก๊สอาร์กอน ที่อุณหภูมิ และเวลาในการเผาเดียวกัน
- ที่อุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาการเกิดสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์สมบูรณ์มากขึ้น สังเกตได้จาก ปริมาณซิลิกอนอิสระมีค่าน้อยกว่าที่พบในสารบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า
- 5. อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิการสังเคราะห์ต่ำมากกว่า อุณหภูมิการสังเคราะห์สูง และที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิช้า ความ สมบูรณ์ของปฏิกิริยาน้อยกว่าการใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว พบปริมาณซิลิกอน อิสระในผงบีตา-ซิลิกอนคารไบด์ ที่ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเร็วต่ำกว่าการเพิ่มอุณหภูมิอย่าง ช้าๆ
- ที่อุณหภูมิเท่ากัน การใช้เวลาในการรักษาอุณหภูมิสูงสุดนานกว่า ปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ มากขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำจะแสดงความแตกต่างมากกว่า

- ที่อุณหภูมิสูงตัวแปรด้านบรรยากาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ และเวลา มีผลต่อปฏิกิริยาการ เกิดซิลิกอนคาร์ไบด์น้อยกว่าที่อุณหภูมิต่ำ
- 8. ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการผสมผงซิลิกอนและคาร์บอนแบล็ก-1 ในเอทิลแอลกอฮอล์ เผาที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็น เวลานาน 1 ชั่วโมง ในสุญญากาศ มีปริมาณซิลิกอนอิสระต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับภาวะอื่นๆ ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 10-100 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิวจำเพาะใกล้เคียงกับผงบีตา-ซิลิกอน คาร์ไบด์ท้องตลาด (betarundum) คือ 19.75 และ 18.03 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ
- 9. ชิ้นงานที่เตรียมจากผงบีตา-ซิลิกอนคารไบด์ที่สังเคราะห์ได้ หลังซินเทอร์ที่ 1850 องศา-เซลเซียส ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน มีค่าความหนาแน่นสูงสุดร้อยละ 89 ความทนแรงดัดโค้ง เท่ากับ 131 เมกะปาสคาล ส่วนความแข็งอยู่ที่ 745 เมกะปาสคาล ซึ่งสมบัติยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ยังมีสารเจือปนที่มาจากสารตั้งต้นอยู่มาก ยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไป
- ปริมาณซิลิกอนอิสระมีผลต่อสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ซินเทอร์ที่ 1850 องศา-เซลเซียส โดยปริมาณมาก ชิ้นงานมีความหนาแน่นลดลง และสมบัติเชิงกลต่ำลง

ข้อเสนอแนะ

- ควรเพิ่มสัดส่วนปริมาณคาร์บอนที่ใช้ เพื่อลดปริมาณซิลิกอนอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยา โดยให้ ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์มากขึ้น
- ควรนำผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ ไปผ่านกระบวนการทางเคมี เช่น นำไปล้างด้วย กรด เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ได้ผงบีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่บริสุทธิ์มากขึ้น
- ทดลองทำการซินเทอร์ชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1850 องศาเซลเซียส เช่น 1900 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มความสามารถในการซินเทอร์ และตรวจสอบสมบัติเปรียบเทียบ กับชิ้นงานที่ซินเทอร์ที่ 1850 องศาเซลเซียส

รายการอ้างอิง

- Properties and Characteristics of Silicon Carbide. Available from : <u>http://www.poco.com/Library/semi/11517SiCPreface.pdf</u>
- 2. Yung-Jen Lin and Chia-Ping Tsang. The Effects of Starting Precursors on The Carbothermal Synthesis of SiC Powders. <u>Ceramics International.</u> 29 (2003) : 69-75.
- Dai Changhong, et al. The Synthesis of Ultrafine SiC Powder by the Microwave Heating Technique. <u>J. Mat. Sci.</u> 32 (1997) : 2469-2472.
- 4. Rasit Koc and Sai V. Cattamanchi. Synthesis of Beta Silicon Carbide Powders Using Carbon Coated Fumed Silica. J. Mat. Sci. 33 (1998) : 2537-2549.
- 5. General Properties of Silicon Carbide. Available from :

www.ifm.liu.se/matephys/new_page/research/sic/chapter2.html.

- 6. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล. <u>การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการ</u> <u>กรอง</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 1999.
- Rainer T. Boride and Carbide Ceramics. In Cahn R.W. Haasen P. and Kramer E.J. (eds). <u>Materials Science and Technology, Vol.11, Structure and Properties of Ceramics.</u> pp. 180-206. New York : Weinheim, 1994.
- 8. Alan W. Weimer. <u>Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing.</u> Chapman & Hall, 1997.
- R. Ren, et al. Synthesis of Nanostructured Silicon carbide Through an Integrated Mechanical and Thermal Activation Process. <u>J. Am. Ceram. Soc.</u> 85 [4] (2002) : 819-827.
- 10. June-Gunn Lee and Ivan B. Cuter. Formation of Silicon Carbide from Rice Hulls. <u>Ceramic</u> <u>Bulletin.</u> 54 [2] (1975) : 195-198.
- 11. V. M. Kevorkijan, et al. Low-Temperature Synthesis of Sinterable SiC Powders by Carbothermic Reduction of Colloidal SiO₂. <u>J. Mat. Sci.</u> 27 (1992) : 2705-2712.
- 12. J. J Biernacki and G. P. Wotzak. Stoichiometry of the C+SiO₂ Reaction. <u>J. Am. Ceram.</u> <u>Soc.</u> 72 [1] (1989) : 122-129.

- M. Narisawa, et al. Synthesis of Ultrafine SiC Powders from Carbon-Silica Hybridized Precursors with Carbothermic Reduction. <u>Journal of Sol-Gel Science and Technology</u> 12 (1998) : 143-152.
- 14. Karine Saulig-Wenger, et al. Direct Synthesis of β -SiC and h-BN Coated β -SiC Nanowires. Solid State Communications. 124 (2002) : 157-161.
- 15. C. Popov, et al. <u>Thin Solid Films.</u> 406 (1999) : 355-356.
- 16. H.Y. Peng, et al. <u>J. Mater. Res.</u> 15 [9] (2002) : 2020.
- 17. P. D. Ramesh, et al. Synthesis of β-SiC Powder by Use Microwave Radiation. <u>J. Mat. Res.</u>
 9 [12] (1994) : 3025-3027.
- M. Sherif El-Eskandarany, et al. Mechanical Solid State Reaction for Synthesis of β-SiC Powder. J. Mat. Res. 10 [3] (1995) : 659-667.
- Zhen-Guo Yang and L.L.Shaw. Synthesis of Nanocrystalline SiC at Ambient Temperature Through High Energy Reaction Milling. <u>NanoStructured Materials.</u> 7 [8] (1996) : 873-886.
- X.Y. Yang, et al. HREM Observations of the Synthesized Process of Nano-sized SiC by Ball Milling of Si and C Mixed Powders. <u>Materials Science and Engineering</u>. A300 (2001): 278-283.
- Jorge Cruz Fernandes, et al. Influence of Gas Environment on Synthesis of Silicon Carbide Through Reaction Between Silicon and Amorphous Carbon in a Solar Furnace at P.S.A. (Plataforma solar de Almeria). Journal of the Ceramic Society of Japan. 106 [8] (1998) : 839-841.
- 22. Narayan J., et al. <u>J. Appl. Phys.</u> 75 (1994) : 7252.
- M. Narisawa, et al. Reaction mechanism of the pyrolysis of polycarbosilane and polycarbosilazane as ceramic precursors. <u>Bull. Chem. Soc. Jpn.</u> 68 (1995) : 1098-1104.
- 24. K. S. Mazdiyasni, et al. Characterization of Organosilicon Infiltrated porous sintered Si₃N₄.
 <u>J. Am. Ceram. Soc.</u> 61 (1978) : 504-508.
- 25. R. West, et al . Phenylmethylpolysilanes : Formable Silane Copolymer with Potential Semiconducting Properties. J. Am. Chem. Soc. 103 (1981) : 7352-7354.
- 26. R. West, et al . Polysilastyrene : Phenylmethylsilane-Dimethylsilane Copolymers as Precursors to Silicon Carbide. <u>Am. Ceram. Soc. Bull.</u> 62 (1983) : 899-903.

- V. Krishnan, et al. Single-Step Synthesis of Chemically Cross-Linked Polysilastyrene and Its Conversion to β-Silicon Carbide. <u>J. Am.Ceram Soc.</u> 85 [2] (2002) : 504-506.
- T. M. Besmann and M. L. Johnson. Kinetics of the Low-Pressure Chemical Vapor Deposition of Silicon Carbide. pp. 443-56, in Proceeding of the International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines (Las Vegas, 1988). Edited by V. J. Tenney. <u>Am. Ceram. Soc.</u> Westerville, OH, 1989.
- 29. F. Kobayashi, et al. Formation of Carbon-Excess SiC from Pyrolysis of CH₃SiCl₃. <u>J. Crystal Growth.</u> 28 (1975) : 95-95.
- 30. X. T. Zhou, et al. β-SiC Nanorods Synthesized by Hot Filament Chemical Vapor Deposition. <u>APPIED PHYSICS LETTERS.</u> 74 [26] (1999) : 3942-3944.
- 31. R. Naslain and F. Langlais. Fundamental and Practical Aspects of the Chemical Vapor Infiltration of Porous Substrates. <u>High Temp. Sci.</u> 27 (1990) : 221-235.
- 32. Nyan-Hwa Tai and Che-Fu Chen. Nanofiber Formation in the Fabrication of Carbon/Silicon Carbide Ceramic Matrix Nanocomposites by Slurry Impregnation and Pulse Chemical vapor Infiltration. <u>J. Am. Ceram. Soc.</u> 84 [8] (2001) : 1683-1688.
- T. M. Besmann, et al. Depletion Effects of Silicon Carbide Deposition From Methyltrichlorosilane. J. Am. Ceram. Soc. 75 [10] (1992) : 2899-2903.
- 34. Applications of SiC. Available from : http://www.applsc.com/sic
- 35. Silicon Carbide Products. Available from : http://www.exolon.com/silicon_carbide.html
- 36. Sintered Silicon Carbide (SiC) Properties and Applications. Available from : http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=15
- 37. Products from SiC. Available from : <u>http://www.advancedmat.com/sic</u>
- Methods for chemical analysis of fine silicon carbide powders for fine ceramics. <u>JIS R</u>
 <u>1616</u> (1994).
- 39. Testing Method for Flexural Strength (Modulus of Rupture) of High Performance Ceramics. <u>JIS R 1601</u> (1981).
- 40. JANAF Thermochemical Tables. J. Phys. Chem. Ref. Data, 14, Suppl.1 (1985).

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การ์ดมาตรฐาน JCPDS

						Wavelength= 1.54056
3	20	Int	h	k	1	
Silicon	28.442	100	1	1	1	
	47.302	55	2	2	0	
Silicon, syn	69.130	6	4	ò	ò	
Rad.: CuKa1x: 1.540598Filter: Mono d-sp: Diff.	76.377	11	3	3	12	
Cut off: Int.: Diffract. I/Icor.: 4.70	94.948	6	5	ĩ	ĩ	
Ref: Nati. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 13, 35 (1976)	106.715 114.087 127.541	8	4 5 6	4 3 2	0 1 0	
Sys.: Cubic S.G.: Fd3m (227)	136.890) 3	5	3	3	
a: 5.43088(4) b: c: A: C:						
α: β: γ: Ζ:8 mp :						
Ref: Ibid.						
Dx: 2.329 Dm: SS/FOM: F ₁₁ = 409(.0021, 13)						
Pattern taken at 25(1) C. This sample is NBS Standard Reference Material No. 640. CAS #: 7440-21-3. Reflections calculated from precision measurement of a0. a0 uncorrected for refraction. C type. Diamond group. Tungsten used as an internal stand. PSC: cF8. To replace 5-565 and 26-1481. Mwt; 28.09. Volume[CD]; 160.18.						
41-1487	2.	Int			-	Wavelength= 1.54056
		- Int				
c	20		h	k	1	
Carbon	26.381	100	h	ĸ	1 20	
Carbon	26.381 42.221 44.391	100 2 6	h 011	k 000	201	
C Carbon Graphite-2H	26.381 42.221 44.391 50.452	100 2 6 <1	h 01110	k 00000	1 20124	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1λ: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff.	26.381 42.221 44.391 50.452 54.542 59.692	100 2 6 1 4 1	h 011101	K 000000	1 201243	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1): 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. I/Icor.: 7.78	26.381 42.221 44.391 50.452 54.542 59.692 77.243	100 2 6 1 4 1 3 9	h 01110111	K 0000001	1 20124307	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1:: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. I/Icor.: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990)	26.381 42.221 44.391 50.452 54.542 59.692 77.243 83.183 86.823 93.594	100 2 6 1 4 1 3 3 1 1	h 0111011102	K 0000001100	1 2012430261	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1\lambda: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. I/Icor.: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990) Sys.: Hexagonal S.G.: P63/mmc (194)	26.381 42.221 44.391 50.452 54.542 59.692 77.243 83.183 86.823 93.594	100 2 6 1 4 1 3 3 1 1	h 011101110N	k 0000001100	1 2012430261	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1X: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. I/Icor.: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990) Sys.: Hexagonal S.G.: P6 ₃ /mmc (194) a: 2.4704(15) b: c: 6.7244(38) A: C: 2.7220	26.381 42.221 44.391 50.452 54.542 59.692 77.243 83.183 86.823 93.594	100 2 6 1 4 1 3 3 1 1	h 0111011102	k 0000001100	2012430261	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1λ: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. Mcor.: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990) Sys.: Hexagonal S.G.: P6 ₃ /mmc (194) a: 2.4704(15) b: c: 6.7244(38) A: C: 2.7220 α: β: γ: Z: 4 mp:	26 26.381 42.221 44.392 54.542 59.692 77.243 83.183 86.823 93.594	100 26 1 4 1 3 3 7 7	h 0111011102	k 0000001100	1 2012430261	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1λ: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. Meen: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990) Sys.: Hexagonal S.G.: P6 ₃ /mmc (194) a: 2.4704(15) b: c: 6.7244(38) A: C: 2.7220 α: β: γ: Z: 4 mp: Ref: Ibid.	26 26.381 42.221 50.452 54.542 59.692 77.243 83.183 86.823 93.594	100 16 1 4 1 3 3 1 1	h 0111011102	K 0000001100	1 2012430261	
C Carbon Graphite-2H Rad.: CuKa1λ: 1.54051 Filter: Ni Beta d-sp: Diff. Cut off: 22.1 Int.: Diffract. I/Icor.: 7.78 Ref: Sanc, I., Polytechna, Foreign Trade Corporation, Panska, Czechoslovakia, ICDD Grant-in-Aid, (1990) Sys.: Hexagonal S.G.: P6 ₃ /mmc (194) a: 2.4704(15) b: c: 6.7244(38) A: C: 2.7220 a: β: γ: Z: 4 mp: Ref: Ibid. Dx: 2.245 Dm: 2.160 SS/FOM: F ₁₀ = 18 (0.042, 13)	26 26.381 42.231 50.452 54.542 59.692 57.243 83.183 86.823 93.594	100 26 1 4 1 3 3 1 1	h 0111011102	K 0000001100	1 2012430261	

.

© 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved PCPDFWIN v. 1.30

10-0173						Wavele	ngth=	= 1.	54(056
AI2O3	2 0	Int	h	k	ī.	2 ₀	Int	h	k	I.
Aluminum Oxide	25.584	75	o	1	2	109.833	<1	1	2	11
	35,136	90	1	0	4	111.029	4	3	1	8
	37.784	40	1	1	Ó	114,126	4	2	2	9
Corundum, syn	41.683	<1	Ó	0	6	116.141	14	3	2	4
	43.362	100	1	1	3	116.630	4	o	1	14
Rad.: CuKa1\l: 1.5405 Filter: Ni Beta d-sp:	46,183	2	2	0	2	117,901	8	4	1	0
Cut off: Int.: Diffract. I/Icor.: 1.00	52,551	45	ō	2	4	120,233	<1	2	3	5
	57.518	80	1	1	6	122.071	4	4	1	3
Ref: Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 9, 3 (1960)	59,767	4	2	1	1	124,647	2	Ó	4	8
	61.164	6	1	2	2	127,731	12	1	3	10
	61.344	8	ò	1	8	129,916	4	3	ō	12
Svs Rhombohedral S.G. R3c (167)	66 547	30	2	1	4	131 148	4	2	ō	14
	68.196	50	3	ò	ò	136,162	22	1	4	6
a: 4.758 b: c: 12.991 A: C: 2.7303	70 357	2	1	2	5	142 396	4	1	1	15
α' β' γ' Ζ' 6 mp: 2050	74.266	4	2	õ	8	145,208	11	4	ò	10
a. p. j. 2.0 mp.2000	76 880	16	٠ĩ.	01	õ	149 287	7	ò	5	4
Ref: Ibid.	77.227	8	i	1	9	150.244	14	ĩ	õ	16
	80 692	8	2	2	ō	152 445	13	3	3	0
	83,217	<1	3	õ	6			•	•	-
Dx: 3.989 Dm: 4.050 SS/FOM: $F_{30} = 50(.0188, 32)$	84 375	6	2	2	ā					
	85 181	ž	1	3	1					
εα: 1.7604 ηωβ: 1.7686 εγ: Sign:- 2V:	86 375	ē	3	1	2					
Ref: Dans's System of Mineralogy 7th Ed. 1 520	86 461	4	1	2	8					
Nel. Dana a System of Milleralogy, 7th Ed., 1, 520	89 018	8	ò	21	ñ					
	90 662	4	ŏ	6 1	2					
Color: Blue, colorless, vellow	91 201	8	1	3	Ā					
Bettern taken at 26 C. Sample appealed at 1400 C for four	95 260	14	2	2	6					
hours in an AI2 O2 equilible. Spectroscenic analysis should	08 407		2	-	2					
-0.1% K No. Si <0.01% Co. Cu. Eo. Mo. Ph: <0.001% B. Cr	101 002	12	2	11	²					
Li Ma Ni Aleo called: ruby Aleo called: caphire Al2 O2	102 799	-1	1	11	2					
Li, Min, Ni. Also called: ruby. Also called: sapphire. Al2 US	102.700				~					
type. Corundum group, corundum subgroup. Also called:	100.540	-1	3	2	1					
alumina.Also called: diamonite.PSC: hR10. MWt: 101.96.	109.522	-1	3	2	•					
volume[CD]. 234.70.										

© 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved PCPDFWIN v. 1.30

41-1105									Waveler	ngth	= 1.	540	56
Y2O3				20	Int	h	k	I.	2θ	Int	h	k	I
Yttrium Oxide				16.691	<1	2	0	0	76.111	1	6	6	0
				20.494	13	2	1	1	77.346	3	8	з	1
				29.150	100	2	2	2	78.588	6	6	6	2
				31.531	<1	3	2	1	79.811	<1	7	5	2
Ded & Ouketh A E40E0	BEilter Cros	h Mana d a	Diff	33.783	24	4	0	0	81.037	4	8	4	0
Rad.: CuKa11: 1.54059	8Filter: Grap	on Mono a-sp	Diff.	35.906	5	4	1	1	82.256	1	8	з	з
Cut off: 15.0 Int.: Diffr	act.	I/Icor.: 9.1		37.908	1	4	2	0	83.481	1	8	4	2
		Dekete Stat	a Linivornity	39.846	6	3	3	2	84.694	2	9	2	1
Ker: Martin, K., McCart	ny, G., North	Dakota Stat	e Oniversity,	41.694	1	4	2	2	85.900	<1	6	6	4
-argo, North Dakota, U	ISA, ICDD G	rant-in-Aid, (1969)	43,498	8	4	3	1	87.118	2	8	5	1
				46.898	2	5	2	1	89.534	2	9	з	2
Sys.: Cubic	S.G.: I	a3 (206)		48.540	39	4	4	0	90.748	4	8	4	4
			•	50.128	2	4	з	3	91.957	2	9	4	1
a: 10.6041(5) b:	C:	A:	C:	51.666	<1	6	0	0	93.172	1	10	ο	ο
μ: <u>β</u> :	Y:	Z: 16	mp: 2440	53.210	5	6	1	1	94.378	1	10	1	1
	1.51			54.697	1	6	2	0	95.586	з	10	2	ο
Ref: Ibid.				56.173	4	5	4	1	96.808	1	9	4	з
				57.620	25	6	2	2	98.030	з	10	2	2
				59.040	5	6	з	1	99.251	2	10	з	1
Dx: 5.031 Dm:	SS/F	OM: $F_{30} = 10$	60(.0060, 31)	60.440	4	4	4	4	101.711	2	8	7	1
				61.820	2	5	4	3	102.963	2	10	4	ο
Color: White				63.178	1	6	4	0	104,195	1	10	з	з
Peak height intensity. S	ample obtain	ned from Re	search	64.526	3	7	2	1	105.451	2	10	4	2
Chemicals, Phoenix, A	rizona, USA.	Annealed fo	r 48 hours at	65.858	1	6	4	2	106.699	1	9	5	4
200 C. Average relativ	e standard o	leviation in in	tensity of the	69.776	2	6	5	1	109.231	2	11	2	1
en strongest reflection	s for three sp	becimen mou	unts =	71.059	4	8	0	0	110.515	1	8	8	ο
2%. Validated by a calc	ulated patter	rn. Bixbyite,		72.337	3	8	1	1	113.117	1	10	4	4
Mn2 O3 type. Also call	ed: yttria.Silic	on used as a	an internal	73,600	2	8	2	0	114.474	1	11	з	2
stand. Single-crystal da 25-1200. Mwt: 225.81.	ita used. PS0 Volume[CD]	C: cl80. To re : 1192.40.	eplace	74.856	2	6	5	3	115.798	1	10	6	0

 2θ
 Int
 h
 k
 I

 117.146
 1
 11
 4
 1

 118.499
 2
 10
 6
 2

 119.943
 <1</td>
 9
 6
 5

LILIDE © 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved PCPDFWIN v. 1.30

29-1129										Wavelength= 1.54056
SIC					20	Int	h	k	T.	
Silicon Cart	oide				35.597 41.383	100 20	1 2 2	102	1	
Moissanite-	3C. svn				71.777	25	3	1	ĭ	
Rad.: CuKa	λ: 1.54178	Filter: Mon	o d-s	p:	75.492	5	2	2	2	
Cut off:	Int.: Diffr	act.	Mcor.:		100,772	10	3	š	ĭ	
Ref: Bind, J Grant-in-Ak	., Penn Stat I. (1977)	e Univ., Uni	versity Park,	PA, USA, ICD	D 104.407 119.987 133.393	5 5	4 4 5	2 2 1	0 2 1	
Sys.: Cubic		S.G.:	F43m (216)							
a: 4.3589	b:	C:	A:	C:						
04.2	β:	γ:	Z: 4	mp:						
Ref: Ibid.										
Dx: 3.216	Dm:	SS/F	OM: F10 = 3	8 (0.027, 10	,					
Color: Gree Specimen f 373-652. C/ L., Bull. Geo Sphalerite g	nish yellow rom PPG In AS #: 409- ol. Soc. Am. proup, sphal	dustries, Inc 21-2. Desc , 69 1633 (1 erite subgro	., Submicron libed by Regi 958). S Zn ty up. Silicon u	SiC - lot no. s, A., Sand, /pe. sed as an						

© © 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved PCPDFWIN v. 1.30 dill_ICDD

Volume[CD]: 82.82.

ภาคผนวก ข



พลังงานอิสระของกิบส์ (ΔG) ของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาววาสนา ฆ้องวงศ์ เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2537 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา บัณฑิต ภาควิชาวัสดุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2545 สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย